МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

А.Н. Иванов

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЗЛОВ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Учебное пособие



Санкт-Петербург

2013

Иванов А.Н. Проектирование узлов оптико-электронных приборов. Методические указания к выполнению курсового проекта. Учебное пособие – СПб: НИУ ИТМО, 2013. – 72 с.

Учебное пособие разработано для ознакомления студентов 3-го курса с особенностями расчета допусков на конструктивные параметры элементов оптических систем и выбора требований к материалам, из которых они изготавливаются в рамках дисциплин «Основы конструирования оптико-электронных приборов и систем» и «Основы конструирования лазерных и оптико-электронных приборов и систем»

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 200400 «Оптотехника» по профилю 200400.62. «Проектирование и метрология оптико-электронных приборов» а также для студентов, обучающихся по направлению 200500 «Лазерная техника и лазерные технологии» по профилю 200500.62 «Лазерная техника и лазерные технологии»

Рекомендовано к печати Ученым советом ФОИСТ от 12 марта 2013 г. протокол № 7



В 2009 году Университет стал победителем многоэтапного конкурса, в результате которого определены 12 ведущих университетов России, которым присвоена категория «Национальный исследовательский университет». Министерством образования и науки Российской Федерации была утверждена программа его развития на 2009–2018 годы. В 2011 году Университет получил наименование «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

© Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2013

© А.Н. Иванов, 2013

Содержание

Введение	4
1. ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ	5
2. ВЫБОР ДОПУСКОВ НА МАТЕРИАЛ ЛИНЗ ОБЪЕКТИВА	13
2.1 РАСЧЕТ ДОПУСКА НА ОТКЛОНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА ЛИНЗЫ	13
2.2 РАСЧЕТ ДОПУСКА НА ОТКЛОНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ДИСПЕРСИИ	15
2.3 ВЫБОР ДОПУСКОВ НА СТЕКЛО ПО ОПТИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ, ДВУЛУЧЕПРЕЛОМ. ПОКАЗАТЕЛЮ ОСЛАБЛЕНИЯ, БЕССВИЛЬНОСТИ И ПУЗЫРНОСТИ	
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКА НА ОБЩУЮ И МЕСТНУЮ ПОГРЕШНОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТ ЛИНЗ, КЛАССА ИХ ЧИСТОТЫ И ПОГРЕШНОСТИ ТОЛЩИН ЛИНЗ	
3.1 РАСЧЕТ ДОПУСКА НА ОБЩУЮ ОШИБКУ	21
3.2 РАСЧЕТ ДОПУСКА НА МЕСТНУЮ ОШИБКУ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЗ	22
3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЧИСТОТЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛИНЗ	23
3.4 РАСЧЕТ ДОПУСКА НА ТОЛЩИНУ ЛИНЗЫ ПО ОСИ	26
4. РАСЧЕТ ДЕЦЕНТРИРОВОК ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЗ И ДОПУСКОВ НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМ ОПРАВЫ	
5. ПРОВЕРКА ВЫБРАННОЙ ПОСАДКИ ЛИНЗЫ В ОПРАВУ, ИСХОДЯ ИЗ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕН ДЕТАЛЕЙ	
6. ВЫБОР ДОПУСКОВ НА МАТЕРИАЛ ПРИЗМЫ, ЕЕ РАЗМЕРЫ И ФОРМУ ПОВЕРХНОСТЕЙ	37
6.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ ПРИЗМЫ И ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ МАТЕРИАЛУ	37
6.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКОВ НА ОБЩУЮ И МЕСТНУЮ ОШИБКИ ПРЕЛОМЛЯЮЩЕЙ И ОТРАЖАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИЗМЫ	40
6.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКОВ НА ОШИБКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УГЛОВ ПРИЗМ И НА ПИРАМИДАЛЬНОСТЬ	41
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИНЗОВЫЕ СИСТЕМЫ	46
1.1 ОБЪЕКТИВЫ МИКРОСКОПОВ	46
1.2 ФОТООБЪЕКТИВЫ	50
1.3 ОКУЛЯРЫ	56
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИЗМЕННЫЕ СИСТЕМЫ	59
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ВЫБОР НЕКОТОРЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕ	НТОВ
	64
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	68
КАФЕЛРА КОМПРЮТЕБИЗУПИЙ И ЦБОЕКТИБОВУНИЙ ОЦТИЛЕСКИХ ЦБИРОБ	OR 60

Введение

Настоящее пособие имеет целью оказание помощи студентам при выполнении конструкторского курсового проекта по дисциплине «Основы конструирования оптико-электронных приборов и систем». Курсовой проект заключается в разработке конструкции линзового объектива и узла крепления призмы на уровне эскизного проекта. Цель проекта — систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных по дисциплинам базовой конструкторско-технологической подготовки и дисциплинам специальности «Прикладная оптика», «Оптические материалы и технологии», «Сборка, юстировка и контроль ОЭП» а также приобретение практических навыков конструкторской деятельности.

Планируемый объем курсового проекта:

- 1. Количество чертежей общего вида 2 шт.;
- 2. Количество рабочих чертежей 4-5 шт.;
- 3. Объем пояснительной записки 15-20 листов формата А4 со следующими разделами:
 - Обоснование и выбор конструкции оптической системы;
 - Расчет допусков на конструктивные параметры деталей оптической системы, выбор требований их материалу;
 - Список использованной литературы.

1. ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

В процессе изучения дисциплины «Основы конструирования оптикоэлектронных приборов и систем» студентам необходимо выполнить курсовой проект, который включает в себя следующие элементы:

- 1. Разработка конструкции объектива и выполнение его сборочного чертежа и спецификации (тип и конструктивные параметры объективов см. в Приложении 1);
- 2. Расчет допусков на материал и конструктивные параметры линз входящих в состав одной из склеек объектива, конструктивные параметры самой склейки и оправы, в которую она установлена. Выполнение рабочих чертежей этих деталей (если конструкция объектива насыпная без оправ, вместо чертежа оправы выполняется чертеж корпуса объектива);
- 3. Определение допусков на материал и конструктивные параметры призмы (тип призмы см. в Приложении 2) и выполнение ее рабочего чертежа;
- 4. Разработка конструкции узла крепления призмы в соответствии с вариантом крепления (см. Приложение 2) и выполнение сборочного чертежа разработанного узла.

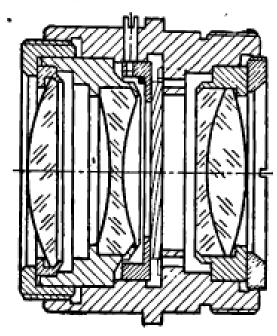


Рис. 1.1 Конструкция объектива «Индустар-50»

В качестве примера для расчета допусков возьмем объектив «Индустар – 50» из библиотеки программы расчета оптических систем ОПАЛ со следующими характеристиками: фокусное расстояние f'=52 мм, угловое поле $2\omega=46$ угл. гр., относительное отверстие D/f'=1/2.9. Конструктивные параметры объектива приведены в таблице 1.

Таблица 1. Конструктивные параметры объектива «Индустар-50»

	Радиусы поверхностей мм	Толщины по оси мм	Марка стекла
1	17.1	2.7	TK 14
2	0	4.16	воздух
3	-33.57	1.05	ЛФ5
4	14.56	5.05	воздух
5	346.7	1.2	ОФ1
6	15	4.7	TK14
7	-23.6		

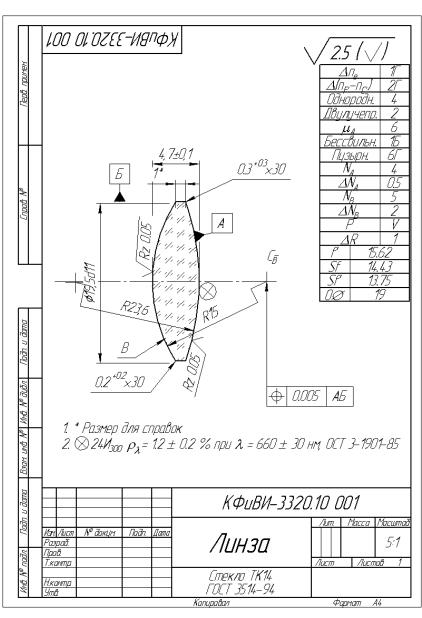


Рис. 1.2 Пример оформления чертежа линзы объектива

Ввиду достаточно жестких требований к качеству изображения при достаточно большом угловом поле целесообразно использовать для объектива насыпную в оправах конструкцию (рис.1.1). Рассмотрим, как выполняется расчет допусков на конструктивные параметры и материал склеенного компонента объектива, отдельной линзы этого компонента и оправы, в которую он устанавливается, а также призмы, установленной за объективом.

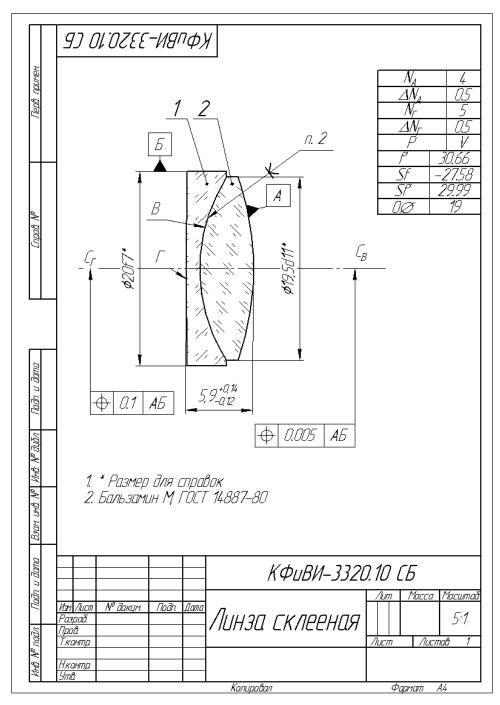


Рис. 1.3 Пример оформления склеенной линзы объектива

Для одиночной линзы необходимо определить требования к ее материалу по показателю преломления, средней дисперсии, оптической однородности, двулучепреломлению, показателю ослабления, бессвильности и пузырности, вычислить допуски на отклонение формы оптической

поверхности N и ΔN , а также на чистоту поверхностей P. Эти данные должны быть сведены в таблицу, расположенную в правом верхнем углу чертежа (рис. 1.2). Кроме этого, требуется вычислить допуски на толщину линзы Δd , ее диаметр и децентрировку поверхностей линзы Δe . На самом чертеже указать все необходимы размеры, фаски, шероховатости, покрытия. Рекомендации по выбору полного диаметра линз и размеров фасок приведены в приложении 3.

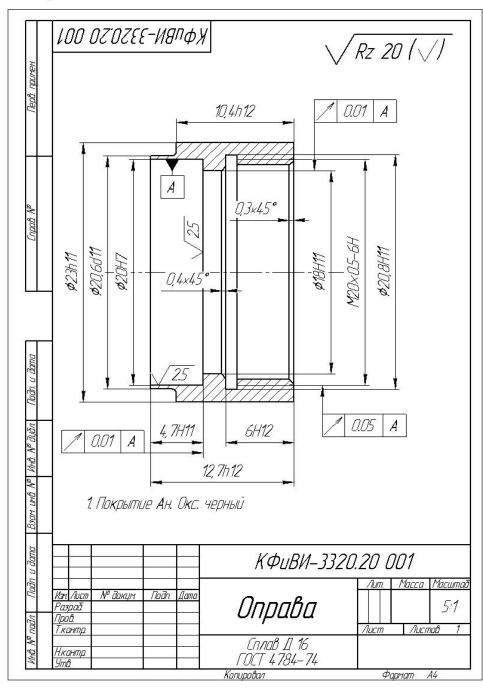


Рис. 1.4 Пример оформления чертежа оправы

Для склейки необходимо указать допуски N, ΔN , P и Δe , обусловленные деформациями и смещениями линз при их склеивании. Пример оформления чертежа склейки приведен на рис. 1.3.

Для оправы, исходя из требований к децентрировке поверхностей склейки, требуется определить значения допусков на диаметр посадочного отверстия оправы, неперпендикулярность опорного буртика эксцентриситет посадочного отверстия (светового отверстия) оправы при выполнении условия самоцентрирования поверхности $D/2R \ge 0.3$ (рис.1.4). При невыполнении этого принципа допуск на эксцентриситет ставится на диаметр посадочного гнезда. Если расчет показывает, что необходим жесткий допуск по децентрировке ($\Delta e < 10$ мкм), то нужна результативная обработка линзы в оправе, для чего на чертеже оправы необходимо предусмотреть технологическую резьбу установки оправы ДЛЯ центрировочный патрон [1].

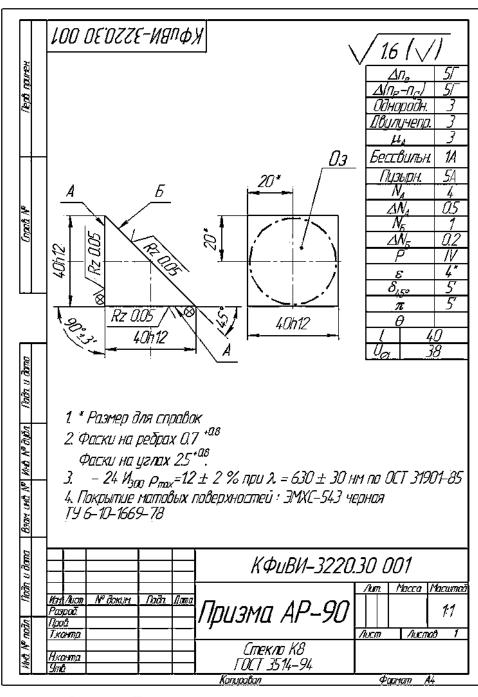


Рис. 1.5 Пример выполнения чертежа призмы

Для призмы нужно провести габаритный расчет, определить ее световой диаметр и требования к материалу призмы, допуски на форму отражающих и преломляющих поверхностей, их чистоту, а также на углы призмы и ее пирамидальность. При расчете и назначении допусков надо помнить, что на отражающие поверхности ставятся более жесткие допуски. Пример оформления чертежа призмы приведен на рис. 1.5.

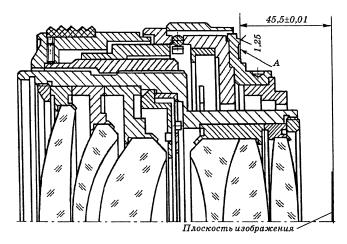
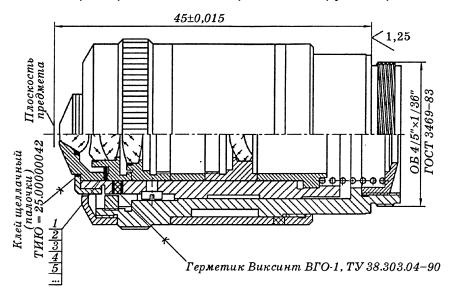


Рис. 1.6. Пример насыпной в оправах конструкции фотообъектива



1.7 Пример насыпной в оправах конструкции микрообъектива

На сборочных чертежах фотообъективов необходимо указать рабочий отрезок — расстояние от опорного торца корпуса объектива до плоскости изображения (рис. 1.6), присоединительный размер (например, диаметр резьбы, с помощью которой фотообъектив ввинчивается в корпус фотоаппарата) и габаритные размеры. Допуск на размер рабочего отрезка определяется исходя из глубины резкости объектива.

На сборочных чертежах микрообъективов необходимо указать высоту микрообъектива - расстояние от плоскости опорного торца микрообъектива до плоскости предмета (45 или 33 мм), диаметр резьбы объектива, с помощью которой осуществляется крепление микрообъектива к тубусу (ОБ 4/5"×1/36", M27×0.75 или M42×0.75) и габаритные размеры (рис. 1.7).

Примеры крепления призм различными способами приведены на рис. 1.8-1.11. При разработке узла крепления надо помнить, что базировать призму желательно на нерабочую грань, иначе возможно нарушение условия полного внутреннего отражения, а ребра и углы призмы должны по возможности не соприкасаться с элементами оправы во избежание выколок стекла.

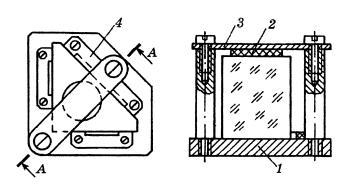


Рис. 1.8 Крепление призмы АР-90 накладкой

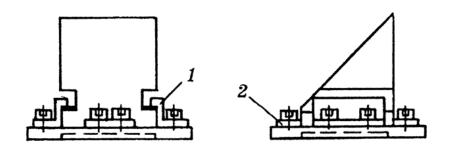


Рис. 1.9 Крепление призмы АР-90 угольниками

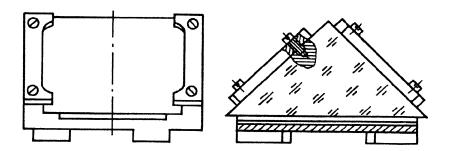


Рис. 1.10 Крепление призмы БР-180 прижимными планками

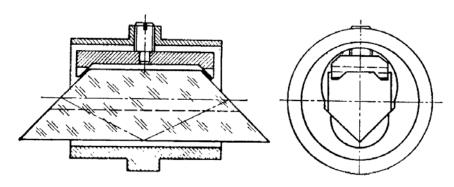


Рис. 1.11 Крепление призмы A_{κ} Р-0 установочным винтом

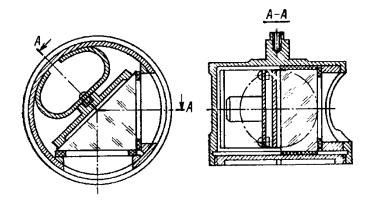


Рис. 1.12 Крепление призмы АР-90 пружиной

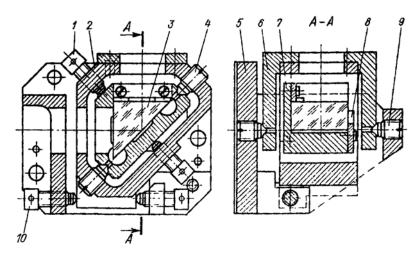


Рис. 1.13 Крепление призмы в юстируемой оправе

С более подробными рекомендациями по разработке деталей и сборочных единиц оптических приборов, оформлению их чертежей и большим количеством примеров можно ознакомиться в работах [1,4,5].

2. ВЫБОР ДОПУСКОВ НА МАТЕРИАЛ ЛИНЗ ОБЪЕКТИВА

В качестве примера выберем двояковыпуклую линзу, входящую в состав склейки объектива. Чертеж линзы должен включать таблицу (рис.1.2), которая располагается в правом верхнем углу чертежа и включает требования к материалу линзы — категорию и класс по показателю преломления и средней дисперсии, категорию по оптической однородности, категорию по двойному двулучепреломлению, категорию по показателю ослабления, категорию и класс по бессвильности и пузырности.

Расчет допусков на показатели качества оптического материала может быть произведен на основе существующих математических моделей или методом аналогий, когда допуски назначаются в соответствии со значениями, взятыми из практики для близкого по характеристикам объектива [1]. Первый способ более актуален на сегодняшний день, особенно с учетом наличия большого количества САПР для расчета оптических систем.

2.1 РАСЧЕТ ДОПУСКА НА ОТКЛОНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА ЛИНЗЫ

Отклонение показателя преломления материала линзы приводит к изменению сферической аберрации, что ухудшает качество изображения, и фокусного расстояния объектива Δf , что, например, приводит к погрешности измерения углов автоколлиматором. Для фотообъектива более критично изменение сферической аберрации. Отклонение фокусного расстояния приводит только к изменению размера изображения $\Delta y' = 2\omega \, \Delta f'$, где 2ω - поле зрения объектива. Изменение сферической аберрации связано с изменением показателя преломления соотношением

 $\Delta n_i \leq 2 \, \Delta \delta s' (h_1/h_i)^4/\sqrt{m} \, h_1^2 \, f'^2 \, (dA_i/dn_i)$, где Δn_i – допуск на показатель преломления і-й линзы, m – число линз, h_i – высота точки встречи луча с і-й линзой, f' – фокусное расстояние объектива, $\Delta \delta s'$ – допустимое изменение сферической аберрации, $dA_i/dn_i = (3n_i^2 - 2n_i) \varphi_i'^3/(n_i - 1)^3 + ((6n_i - 2) \, \sigma_i - (4n_i - 1) \, \rho_{1i}) \, \varphi_i'^2/(n_i - 1)^2 + ((1 + 2/n_i^2) \, \rho_{1i}^2 + (4 + 4/n_i^2) \, \sigma_i \, \rho_{1i} + (3 + 2/n_i^2) \, \sigma_i^2) \, (\varphi_i'/(n_i - 1))$, где φ = 1/f' - оптическая сила і-й линзы, φ = 1/r - кривизна первой по ходу луча поверхности і-й линзы, φ = 1/s – сходимость (величина обратная расстоянию от линзы до создаваемого ею изображения).

Формула (1) достаточно громоздка, и требует большого количества промежуточных вычислений. Поэтому онжом поступить проще, воспользовавшись программой расчета оптики ОПАЛ И рассчитав влияния $Sn_i = dn_i/d(\Delta \delta s_i)$, коэффициент связывающий изменение

показателя преломления стекла i-й линзы с изменением сферической аберрации. Для расчета коэффициента влияния необходимо выбрать в библиотеке ОПАЛ объектив «Индустар — 50» (или задать его) и перейти в пункт «Технология» меню «Выполнить». В открывшемся подменю выбрать пункт «Влияние параметров на аберрации» \rightarrow «Ввод исходных данных», после чего откроется окно, в котором можно задать марки исследуемых параметров (в нашем случае это марка показателя преломления) и марки исследуемых функций (марка продольной сферической аберрации). Под термином «марка» в программе ОПАЛ понимается переменная, которой присваивается определенное значение, например изменение радиуса кривизны линзы или изменение аберрации, вызванное изменением этого радиуса.

Марка показателя преломления будет иметь вид «N», марка продольной сферической аберрации - «DSA/01», где значение «0» - расчет проводится для основной длины волны «е», значение «1» - расчет проводится для луча, проходящего через край входного зрачка. После задания необходимых параметров, окно программы должно соответствовать рис. 2.1.

```
SYSTEM: Индустар-50 f'=52 2w=46 1:2.9 4линзы
—ST01FA07.VPA
nla=1;
MP(*)= N;
MF(*) = DSA/01;
```

Рис. 2.1 Окно ввода исходных данных для расчета коэффициента влияния показателя преломления на продольную сферическую аберрацию

Нажатие клавиши «F4» осуществляет трансляцию исходных данных. После этого необходимо выйти из окна задания исходных данных расчета, не забыв сохранить изменения.

Затем нажатием клавиши «ENTER» запускается пункт меню «Расчет матрицы влияния». Для просмотра таблицы влияния параметра на аберрацию выбирается пункт «Просмотр результатов», при запуске этой опции необходимо подтвердить заданные выше марки нажатием на клавишу «Пробел». Вид таблицы приведен на рис. 2.2.

SYSTEM: Индустар-	50 f'=52	2 ⊮=4 6 1	1:2.9 4ли	НЗЫ	JOB:
ИСХ	. N	N	N	И	
СИСТ	. 1	3	5	6	
ИЗМ.ПАР->	000050	.00050	.00050	.00050	
DSA /01 1.24	9302236	.03617	.03246	04486	

Рис. 2.2 Таблица влияния на продольную сферическую аберрацию отклонения показателя преломления

Из полученной таблицы видно, что для исследуемой линзы (она последняя в таблице) изменение показателя преломления на величину, равную 5×10^{-4} приводит к изменению продольной сферической аберрации на 0.0448 мм. Тогда коэффициент влияния будет равен Sn=0.0005/0.0448=0.011. Допустимое изменение сферической аберрации для объектива можно

определить из [3] как $\Delta c \varphi = 3.9 \, \lambda / \, A'^2$. Принимая среднее значение длины волны $\lambda = 0.55$ мкм и определяя заднюю апертуру как A' = D/2f' = 0.17, получим $\Delta c \varphi = 74.2$ мкм.

Необходимо учесть, что на изменение сферической аберрации оказывает влияние не только отклонение показателя преломления, но и погрешность толщин линз, погрешность воздушных промежутков между линзами и погрешность радиусов кривизны линз – всего 17 первичных погрешностей. Тогда на погрешность отклонения показателя преломления отдельной линзы придется допуск равный $\Delta c \phi_i = \Delta c \phi / \sqrt{17} = 18$ мкм. Допуск на показатель преломления составит $\Delta n = \Delta c \Phi_i \times Sn = 0.011 \times 18 \times 10^{-3} \approx 1.98 \times 10^{-4}$ (при вычислении допуска необходимо задавать допуск на аберрацию в Обращаясь к таблице 1, видим, миллиметрах). что такой категории по показателю преломления. соответствует 1 однородности желательно выбирать в пределах указанной категории (класс Γ) [2].

Если к объективу предъявляются повышенные требования по качеству изображения, то используется пересчет на конкретную плавку стекла и в этом случае необходимо минимизировать отклонение показателя преломления для этой плавки. Выбор класса (A, Б или B) тогда определяется, какими изменениями Δn можно пренебречь при расчете системы.

Таблица 1. Категории и классы однородности партии заготовок бесцветного оптического стекла по показателю преломления

Категория по показате- лю преломле- ния	Предельное отклонение показателя преломления $\pm \Delta n_e \cdot 10^{-4}$	Класс однородно- сти по показате- лю преломления	Наибольшая разность показателей преломления $\Delta n_e \cdot 10^{-4}$
1 2 3 4 5	2 3 5 10 20	А Б В Г	0,2 0,5 1,0 В пределах категории, указанной при заказе

2.2 РАСЧЕТ ДОПУСКА НА ОТКЛОНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ДИСПЕРСИИ

Для выбора категории и класса стекла по средней дисперсии в пункте «Влияние параметров на аберрации» в окне «Ввод исходных данных» следует указать следующие марки (рис. 2.3). Здесь «nla = 3» — количество используемых длин волн (основная длина волны 0.55 мкм и дополнительные 0.65 и 0.48 мкм), «ND» — марка отклонения средней дисперсии линзы, «DSA/'1» — марка хроматической аберрации положения, вызываемой отклонением дисперсии стекла, значение «'» говорит о том, что расчет ведется для всех заданных длин волн.

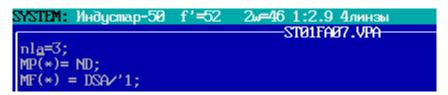


Рис. 2.3 Окно ввода исходных данных для расчета коэффициентов влияния отклонения дисперсии на хроматическую аберрацию положения

Дальнейшие действия аналогичны описанным в пункте 2.1. Анализ результатов, полученных в окне «Просмотр данных» (рис. 2.4), показывает, что изменение дисперсии на 5×10^{-5} приводит для последней линзы к изменению аберрации на 0.015 мм. Тогда коэффициент влияния будет равен $S_{\Delta(nF'-nC')}=5\times 10^{-5}/0.015=3.3\times 10^{-3}$.

SYSTEM: Инду	стар-50	f'=52	2 ⊮=4 6 1	:2.9 4ли	НЗЫ	٠.
	ИCX.	ND	ND	ND	ND	
	СИСТ.	1	3	5	6	
изм.пар->	0.	.00005	.00005	.00005	.00005	
DSA /'1	.48708	01004	.01219	.00964	01535	

Рис. 2.4 Таблица влияния на хроматизм положения отклонения дисперсии стекла

Предельное значение хроматической аберрации положения может быть вычислено из выражения $\Delta xp = \bar{\lambda} / A'^2 = 19$ мкм. Так как вклад в указанную аберрацию вносят 4 линзы, то вклад каждой из них составит $\Delta xp_i = \Delta xp/\sqrt{4} = 9.5$ мкм. Допуск на отклонение дисперсии составит $\Delta (n_f, -n_{c'}) = S_{\Delta(nF'-nC')} \times \Delta xp_i = 3.3 \times 10^{-3} \times 9.5 \times 10^{-3} = 3.1 \times 10^{-5}$, что соответствует 2 категории по средней дисперсии (см. таблицу 2), класс следует взять в пределах категории (Γ). Класс B используется при пересчете на плавки.

Таблица 2. Категории и классы однородности бесцветного оптического стекла по средней дисперсии

Категория по средней дисперсии	Предельное отклонение средней дисперсии $\pm \Delta (n_{F'} - n_{C'}) \cdot 10^{-5}$	Класс однород- ности по средней дисперсии	Наибольшая разность средних дисперсий $\pm \Delta (n_{F'} - n_{C'}) \cdot 10^{-5}$
1 2 3 4 5	2 3 5 10 20	ВГ	1,0 В пределах категории, указанной при заказе

Для вычисления допуска на среднюю дисперсию также можно пользоваться следующей формулой:

$$\Delta(n_{f'}-n_{c'}) = -\frac{\Delta \mathrm{xp}}{\sqrt{m\times f'^2}} \left(\frac{h_1}{h_i}\right)^2 (n_d-1)_i f'_i,$$

где h — высота падения луча на линзу, f'_I — фокусное расстояние i-й линзы, f' — фокусное расстояние объектива, m — число линз объектива.

2.3 ВЫБОР ДОПУСКОВ НА СТЕКЛО ПО ОПТИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ, ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЮ, ПОКАЗАТЕЛЮ ОСЛАБЛЕНИЯ, БЕССВИЛЬНОСТИ И ПУЗЫРНОСТИ

Категория стекла по оптической однородности назначается, как правило, по аналогии. Для фотографических объективов рекомендуют выбирать 3-4 категорию (см. таблицу 3).

Таблица 3. Категории бесцветного оптического стекла по оптической однородности

Категория оптической однородности	Отношение углов φ/φ ₀ , не более
1	1,0
2	1,0
3	1,1
4	1,2
5	1,5

Примечание. Дифракционное изображение точечной миры должно состоять из круглого пятна, окруженного концентричными кольцами, и не должно иметь разрывов, хвостов и заметного на глаз отклонения от круга.

Аналогично поступают и с выбором категории стекла по двулучепреломлению. Для линз фотообъектива рекомендуется использовать стекло 2-й категории (см. таблицу 4).

Таблица 4. Категории оптического бесцветного стекла по двулучепреломлению

Катего- рия стекла	не бо	иепреломление, лее, при оптиче рициенте напря $B\cdot 10^{-12}$, Па $^{-1}$	еском	Примечание
	до 2,0	св. 2,0 до 2,8	св. 2,8	
1	1,5	2	3	-
2	4	6	8	
3	7	10	13	В заготовках деталей поляризационных приборов при просмотре в поляризованном свете в рабочем направлении не должны обнаруживаться просветленные участки
4	10	15	20	
5	35	50	65	_
6	80	80	80	Для кристаллов и поликристалли- ческих материалов

Выбор категории стекла по показателю ослабления зависит от суммарной толщины деталей объектива. В нашем случае суммарная толщина 4-х линз объектива L=0.27+0.1+0.12+0.47=0.86 см, что позволяет считать его тонким (L<1 см) и назначить 6 категорию стекла по показателю ослабления (см. таблицу 5).

Таблица 5. Категории бесцветного оптического стекла по показателю ослабления

Категория	Показатель ослабления μ_A , ${ m cm}^{-1}$	Коэффициент пропускания стекла в слое $1\ { m cm}$, $ au_A$	Коэффициент внутреннего пропускания для толщины 10 см т _{іА} , не менее
1	0,0002-0,0004	0,9995-0,9990	0,991
2	0,0005-0,0009	0,999-0,998	0,980
3	0,0010-0,0017	0,998-0,996	0,962
4	0,0018-0,0025	0,996-0,994	0,944
5	0,0026-0,0035	0,994-0,992	0,925
6	0,0036-0,0045	0,992-0,990	0,902
8	0,0046-0,0065	0,990-0,985	0,861
	0,0066-0,0130	0,985-0,970	0,741

Изменение пропускания объектива при изменении показателя ослабления можно оценить по формуле $d\tau = \sum_{1}^{k} \frac{\tau \ l_{k}}{\tau_{k}} \ d\tau_{k}$, где l – толщина k-го компонента объектива, τ_{k} – коэффициент пропускания k-го компонента объектива, $d\tau_{k}$ – изменение коэффициента пропускания k-го компонента, $d\tau$ - изменение коэффициента пропускания объектива. Для объектива «Индустар-50» при переходе от 1-й категории к 6-й при пропускании объектива $\tau = 0.8$ изменение пропускания будет $d\tau = 0.8 \times 0.86 \times 0.009/0.99 = 0.006 = 0.6\%$. Уменьшение пропускания системы на 1-2% считается вполне допустимым, поэтому расчетное отклонение 0.6% укладывается в допуск.

По бессвильности на объективы рекомендуется назначать допуск по 1-й категории, т.к. наличие свилей приводит к резкому снижению разрешающей способности (таблица 6). 2-я категория допускается для линз окуляров, конденсоров, защитных стекол, работающих с малым увеличением. Класс стекла по бессвильности должен соответствовать классу Б, класс А используется для призм.

Критерием для назначения категории и класса по пузырности является условие, по которому суммарная площадь пузырей во всех линзах объектива не должна превышать 2.5% площади входного зрачка [2]. Назначим допуск 6Г и посмотрим, выполняется ли указанный критерий. Для выполнения расчета воспользуемся данными из таблицы 7.

Сначала вычислим массу линз – для этого надо в программе ОПАЛ в разделе «Технологии» выбрать пункт «Масса линз». Результат расчета приведен на рис. 2.5.

Таблица 6. Категории и классы оптического стекла по бессвильности

Категория	Характеристика бессвильности	Преимущественная область применения				
1	Не допускаются свили, обнаруживаемые при просмотре на установках, градуированных по контрольному образцу 1-й категории по ГОСТ 3521-69 или по образцу сравнения для ИК-области	Оптическое стекло всех ти- пов в заготовках диаметром				
2	Не допускаются свили, обнаруживаемые при просмотре на установках, градуированных по контрольному образцу 2-й категории по ГОСТ 3521-69 или по образцу сравнения для ИК-области	или с наибольшей стороной не более 500 мм				
3	Не допускаются видимые в про- ходящем свете потоки свилей; допускаются одиночные и узло- вые свили	Бесцветное стекло в за- готовках диаметром или с наибольшей стороной св. 500 мм; цветное стекло и стекло с особыми оптиче- скими свойствами в заго- товках любых размеров				
3a	Не допускаются видимые в про- ходящем свете потоки свилей, одиночные и узловые свили, иска- жающие рассматриваемый через стекло объект, заданный техни- ческими требованиями на стекло заготовки	Оптическое стекло всех типов в заготовках любых размеров для деталей на- блюдательных приборов				
4	Допускаются свили, оставшиеся после перемешивания по установленному технологическому режиму для стекла конкретной марки	готовках диаметром или с наибольшей стороной				
Класс	Число направлени	й просмотра				
A	Два взаимно перпендикулярных					
В	Одно					

Примечание. В бесцветном и цветном стекле, заказанном по 1-й и 2-й категориям, допускаются узловые свили длиной не более 10 мм и в количестве не более 10 на 1кг.

Так как суммарная масса линз составляет всего 6.64 гр, а в соответствии с классом пузырности Γ на 1 кг стекла должно приходиться не более 100 пузырей, то на всю оптическую систему теоретически может приходиться всего 1 пузырь диаметром 0.7 мм. Его площадь равна 0.4 мм 2 , в то время как диаметр входного зрачка системы 127.2 мм 2 . Площадь пузыря меньше 1% площади входного зрачка, поэтому критерий выполняется. Более точно

выбор категории и класса по пузырности и свильности можно выполнить через расчет деформации волнового фронта, вызванный этими дефектами, согласно работам [3,7].

Таблица 7. Категории и классы бесцветного оптического стекла по пузырности

Категория	Диаметр пузыря, мм, не более	Группа	Суммарная площадь, мм ² , сечений пузырей в 100 см ³
1 1a 2 3 4 5 6 7 8 9	Не допускается 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 2,0 3,0 5,0	11 ↑ 12 13 14 15 16 17	До 0,029 (включ.) Св. 0,029 до 0,0125 • 0,125 • 0,250 • 0,25 • 0,50 • 0,5 • 1,0 • 1,0 • 2,0 • 2,0 • 4,0
Класс	Среднее число пузырей диа- метром св. 0,03 мм в 1 кг,	Класс	Среднее число пузырей в 100 см ³
:	не более	1	
А В Г Д Е Ж	не более 3 10 30 100 300 1000 3000	21 22 23 24 25 26 27 28	До 1,0 включ. Св. 1,0 до 2,5 2,5 » 6,3 6,3 » 16,0 16,0 » 40,0 40,0 » 80,0 80,0 » 150,0 150,0

	No	lo No ποδ.		MACCA(r)	Форма	Радиусы		Толщина	Св. диа	эметры	Плотн
l		А	Б	констр.		A (MM)	Б (мм)	(MM)	А	В	г⁄мл
Į											
ı	1	1	2	1.30		17.10	0.00	2.7	18.4	18.4	3.5
ı	2	3	4	1.70	X	-33.57	-14.56	1.1	15.9	14.8	3.2
ı	3	5	6	1.52	$-\overline{\alpha}$	346.70	-15.00	1.2	15.6	17.4	2.6
ı	4	6	7	2.12	Ō	15.00	23.60	4.7	17.4	17.6	3.5

Рис. 2.5 Окно с конструктивными параметрами линз объектива

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКА НА ОБЩУЮ И МЕСТНУЮ ПОГРЕШНОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЗ, КЛАССА ИХ ЧИСТОТЫ И ПОГРЕШНОСТИ ТОЛЩИН ЛИНЗ

3.1 РАСЧЕТ ДОПУСКА НА ОБЩУЮ ОШИБКУ

Отклонение радиуса кривизны преломляющей поверхности линзы приводит к появлению сферической аберрации. Ввиду особенности контроля радиуса кривизны интерференционным способом, допуск на этот параметр назначается в кольцах интерференционной картины. Для пересчета допуска в линейные единицы можно воспользоваться формулой $\Delta r = \frac{4 \, r^2 \, N \, \lambda}{D^2}$, где r номинальное значение радиуса кривизны линзы, N – допуск в интерференционных кольцах, D – диаметр пробного стекла.

Исходя из допустимого значения сферической аберрации Δ сф, допуск N можно определить из выражения

$$N_i = \frac{2 \Delta c \Phi}{4 \sqrt{m} h_1^2 f'^2} \left(\frac{h_1}{h_i}\right)^4 \frac{D_i^2}{dA_i \lambda}.$$

Пользоваться этой формулой сложно, так как требуется рассчитать коэффициент влияния каждого радиуса dA, что довольно трудоемко. Поэтому расчет допуска N желательно проводить с помощью программы расчета оптики ОПАЛ. Для этого необходимо в окне ввода данных ввести марки, соответствующие рис. 3.1.

Рис.3.1 Окно ввода исходных данных для расчета коэффициентов влияния отклонения радиусов кривизны линз на сферическую аберрацию

На рис. 3.1 марка «RN» – допуск под пробное стекло (по умолчанию изменение этого параметра составляет 3 кольца). После трансляции данных в пункте «Просмотр результатов» было сформировано окно с результатами, приведенными на рис. 3.2.

SYSTEM: Индустар-	50 f' = 52	2 ⊮=4 6 :	1:2.9 4ли	1H36I	JOB: ∨	P 1	l:37 OPAL-I
ИСХ	. RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN
СИСТ	. 1	2	3	4	5	6	7
изм.пар->	000568	-51440.	03114	.00671	-3.3815	00467	.01154
DSA /01 1.17	7101537	01316	02409	02348	00475	00399	01305

Рис.3.2 Таблица влияния на продольную сферическую аберрацию отклонений радиусов кривизны линз объектива

Так как значение допуска на радиус линзы в миллиметрах зависит от диаметра линзы, то в верхней строке полученной таблицы изменение параметра тоже задано в миллиметрах. Для 6-й и 7-й поверхностей, принадлежащих 4-й линзе, передаточные коэффициенты составят $S_{N6}=0.00467/0.00399=1.17$ и $S_{N7}=0.01154/0.01305=0.88$. В предыдущем разделе было определено, что на каждую погрешность, приводящую к сферической аберрации, можно выделить допуск Δ cф $_i=\Delta/\sqrt{17}=18$ мкм. Тогда получим $\Delta r_6=S_{N6}\times\Delta$ cф $_i=1.17\times18=21$ мкм и $\Delta r_7=S_{N7}\times\Delta$ cф $_i=0.88\times18=15.8$ мкм. Переходя к допуску в интерференционных кольцах по формуле $N=\frac{D^2\Delta r}{4\,r^2\lambda}$, получаем допуски на общую ошибку $N_6=\frac{302.8\times21\times10^{-3}}{4\times225\times0.55\times10^{-3}}=12.8$ и $N_7=\frac{309.8\times15.8\times10^{-3}}{4\times557\times0.55\times10^{-3}}=4$. Широкий допуск на 6 поверхность объясняется тем, что она идет в склейку и слабо влияет на изменение аберрации (что подтверждается таблицей на рис. 2.2). Желательно задать $N_6=5$, так как при грубом изготовлении склеиваемых поверхностей возможна их расклейка [2].

3.2 РАСЧЕТ ДОПУСКА НА МЕСТНУЮ ОШИБКУ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЗ

Вычислим допуск на местную ошибку поверхностей линз. Известно, что местная ошибка поверхностей линз приводят к появлению астигматизма, предельное значение которого может быть определено из выражения $\Delta(x'_m - x'_s) = 0.68 \, \lambda/A'^2 = 0.68 \times 0.55/0.029 = 12.9$ MKM [4]. объектив имеет 7 рабочих преломляющих поверхностей, поэтому на каждую из них придется $\Delta_i(x'_m - x'_s) = \Delta(x'_m - x'_s)/\sqrt{7} = 4.9$ мкм. В учебной версии ОПАЛа нет возможности напрямую вычислить коэффициенты поэтому влияния ДЛЯ местной ошибки, ОНЖОМ воспользоваться приближенной формулой

$$\Delta N_{i} = \frac{D_{i}^{2} \Delta_{i} (x'_{m} - x'_{s})}{\frac{h_{i}}{h_{1}} 4 (n'_{i} - n_{i}) f'^{2} \lambda},$$

где h — высота встречи осевого луча с поверхностью. Подставляя в формулу исходные данные, получаем $\Delta N_6 = \frac{(17.4)^2 \times 4.9 \times 10^{-3}}{\frac{7.8}{9} \, 4 \, (1.53 - 1.61) \times 52.4^2 \times 0.55 \times 10^{-3}} = 3.5$ (данная поверхность входит в склейку и разность показателей преломления на границе минимальна) и $\Delta N_7 = \frac{(17.6)^2 \times 4.9 \times 10^{-3}}{\frac{7.8}{9} \, 4 \, (1.61 - 1) \times 52.4^2 \times 0.55 \times 10^{-3}} = 0.47 \approx 0.5$. Допуск на шестую поверхность желательно ужесточить до $\Delta N_6 = 2$, так как выдержать его не составит большого труда.

Необходимые для расчета показатели преломления берутся из окна «Конструктивные параметры» программы ОПАЛ, высоты встречи осевого

луча с поверхностями можно посмотреть в пункте «Ход лучей в оптической системе», который находится в разделе «Анализ аберраций».

3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЧИСТОТЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛИНЗ

Допуск на чистоту поверхности определяет число дефектов типа царапин, точек, вскрытых пузырей, выколок и т.д. на единицу площади поверхности линзы. Требования к чистоте задаются с помощью классов чистоты – трех нулевых (Таблица 1), определяющих требования к установленным оптическим деталям, плоскости формирования В изображения, И двенадцати для деталей, удаленных OT плоскости формирования изображения (Таблица 2).

Выбор класса чистоты производится, как правило, по аналогии – в таблице 3 приведены рекомендации по назначению в зависимости от типа и назначения оптической системы.

	Таблица 1. Нулевые классы чистоты поверхностей оптических деталей					
	•	•				
K	пасс	Царапины	Диаметр	Число точек, не более, при световом диаметре		

	16		L	Ц арапины	Диаметр	Число точек, не более, при световом диаметре			
	Класс чисто- ты <i>Р</i>	Зона	Шири- на, мм, не более	Суммарная дли- на от светового диаметра, мм, не более	точек, мм, не более	от 5 до 20 (включ.)	св. 20 до 60	св. 60	
,	0-10	Средняя Краевая	0,002 0,004	0,2 0,3	0,004 0,006	1 3	3 6	5 10	
	0-20	Средняя Краевая	0,004 0,006	0,2 0,3	0,010 0,015	1 3	3 6	5 10	
	0-40	Средняя Краевая	0,006 0,008	0,2 0,3	0,015 0,025	1 3	3 6	5 10	

Для визуальных оптических приборов, например микроскопов и телескопических систем класс чистоты оптических деталей назначают исходя из диаметра рабочего отверстия их поверхностей. Под рабочим понимается участок поверхности оптической отверстием перекрываемый осевым пучком лучей, которые при выходе из окуляра образуют параллельный пучок диаметром 2 мм или пучок равный диаметру выходного зрачка оптической системы, если он меньше 2 мм.

Диаметр рабочего отверстия вычисляется по формуле $D_n = 4 \; h_n/D_p$, при $D_{p\prime}>2$ мм, или $D_n=2\;h_n$ при $D_{p\prime}\le 2$ мм, где D_{n} – диаметр рабочего отверстия n-й поверхности, $h_{\rm n}$ – высота крайнего луча осевого пучка на той же поверхности (определяется из окна «Ход лучей в оптической системе» программы OPAL). $D_{p'}$ – диаметр выходного зрачка оптической системы. По вычисленному диаметру рабочего отверстия выбирают класс чистоты по таблице 4.

Таблица 2. Основные классы чистоты поверхностей оптических деталей

	Цара	пины	Точ	ки	Скопление	дефектов
Класс чистоты	Шири- на, мм, не более	Сум- марная длина, мм, не более	Диаметр, мм, не более	Число, не более	Диаметр ограниченного участка, мм	Суммарная площадь царапин и точек, мм ² , не более
I	0,004		0,02		1,0	0,004
II	0,006		0,05		1,2	0,006
III	0,010		0,10	0,5×O _Ø	2,0	0,020
IV	0,02	2,0×O _Ø	0,30		5,0	0,10
V	0,04	2,0×0ø	0,50		10,0	0,40
VI	0,06		0,70		25,0	3,00
VII	0,10		1,00		50,0	10,00
VIII	0,20		2,0	0,4×0 _Ø		
VIIIa	0,30	$1,5 \times O_{\emptyset}$	2,0	0,4×0ø	He	Не норми-
IX	0,30	$2,0 \times O_{\emptyset}$	3,0	0,3×O _Ø	нормируется	руется
IXa	0,4	$1,5 \times O_{\emptyset}$	0,0	0,3×0 _Ø		

Таблица 3. Рекомендуемые классы чистоты поверхностей оптических деталей в зависимости от их вида и назначения

Классы чистоты	Вид и назначение оптических деталей
0 - 10 $0 - 20$	Сетки и коллективы в приборах с фокусным расстоянием окуляра или последующей оптической системы от 10 до 15 мм; шкалы и лимбы, рассматриваемые под увеличением более 25^{\times} ; подложки дифракционных решеток.
0 – 20	Сетки и коллективы в приборах с фокусным расстоянием окуляра или последующей оптической системы от 15 до 25 мм; шкалы и лимбы, рассматриваемые под увеличением от 25 до 10^{\times}
0 - 40	Сетки и коллективы в приборах с фокусным расстоянием окуляра или последующей оптической системы более 25 мм; шкалы и лимбы, рассматриваемые под увеличением менее 10^{\times} ; подложки растров и детали, находящиеся в плоскости изображения фотоэлектрических систем, работающих в ИК области спектра

I	Первая линза широкоугольных окуляров4 первая линза микрообъективов с увеличением больше 10^{\times}
II	Призмы, коллективы, первая линза широкоугольного окуляра и другие детали, расположенные вблизи от плоскости действительного изображения оптической системы; линзы микрообъективов
III	Линзы окуляров телескопических приборов; микроскопов и измерительных лабораторных приборов; окулярные призмы; выравнивающие стекла фотообъективов; линзы объективов, работающих в ИК области спектра в условиях солнечной засветки; пластины и кольца стоп; призмы, применяемые в качестве оптико-механических затворов и зеркал отражателей; плоско-параллельные пластины, применяемые в качестве компенсаторов светоделительных пластин; подложки для диэлектрических зеркал в световой зоне, применяемые в твердотельных лазерах и лазерных приборах
IV	Линзы окуляров, объективов и оборачивающих систем в телескопических приборах; призмы и пластины в параллельных и сходящихся пучках лучей телескопических приборов; лупы, линзы конденсоров и объективов, работающих в ИК области при отсутствии солнечной засветки; выравнивающие стекла фотоаппаратов; подложки для интерференционных светофильтроф, защитные стекла электронно-лучевых трубок
V	Линзы объективов, окуляров и оборачивающих систем; головные призмы; призмы в параллельных пучках и защитные стекла в телескопических приборах; линзы и зеркала фотографических, киносъемочных и проекционных объективов диаметром от 20 до 50 мм; линзы конденсоров и объективов, работающих в ИК-области при отсутствии солнечной засветки, активные элементы лазеров, отражатели для лазеров
VI	Линзы объективов и оборачивающих систем телескопических приборов; линзы и зеркала фотографических, киносъемочных и астрономических объективов диаметром от 50 до 100 мм
VII	Линзы и зеркала фотографических, киносъемочных и астрономических объективов диаметром от 100 до 300 мм; смотровые стекла размером до 300 мм
VIII, IX	Линзы и зеркала фотографических и астрономических объективов диаметром от 300 до 500 мм; смотровые стекла размером от 300 до 500 мм

	Линзы и	зеркала фотографических и астрономически
VIIIa, IXa	объективов размером бо	диаметром более 500 мм; смотровые стеклопее 500 мм

Таблица 4. Зависимость класса чистоты поверхности оптической детали от диаметра рабочего отверстия

Anamerpa pado iero ori	P
Диаметр рабочего отверстия в мм	Класс чистоты
	P0 – 10
0	P0 – 20
	P0 - 40
До 0.5	PI
От 0.5 до 1.5	PII
От 1.5 до 4.5	PIII
От 4.5 до 10	PIV
От 10 до 25	PV
От 25 до 50	PVI
Свыше 50	PVII

В нашем случае для фотообъектива следует руководствоваться таблицей 3 — чистота поверхностей линз фотообъектива должна соответствовать V категории.

3.4 РАСЧЕТ ДОПУСКА НА ТОЛЩИНУ ЛИНЗЫ ПО ОСИ

Погрешность осевых толщин линз приводит появлению сферической аберрации и ухудшению качества изображения, а также к изменению фокусного расстояния, что может быть критично для некоторых оптических приборов, например биноклей. Пользуясь формулой для определения предельного значения сферической аберрации и зная число источников первичных погрешностей, приводящих к появлению сферической аберрации, определяем допустимый вклад отклонения толщины линзы в изменение сферической аберрации $\Delta c \phi_i = \Delta c \phi / \sqrt{17} = 18$ мкм.

Окно ввода данных для расчета коэффициентов влияния толщин линз на сферическую аберрацию в ОПАЛ будет иметь вид, как на рис. 3.3, где «D» –

марка изменения толщин линз и воздушных промежутков (по умолчанию 50 мкм). Результат расчета представлен на рис. 3.4.

```
SYSTEM: Индустар-50 f'=52 2w=46 1:2.9 4линзы J
ST01FA07.VPA
nla=1;
MP(*)= D;
MF(*) = DSA/01;
```

Рис. 3.3 Окно ввода марок для расчета коэффициента влияния толщин линз на сферическую аберрацию

SYSTEM: Инду	стар-50	f'=52	2 ⊮=4 6 1	1:2.9 4ու	4 НЗЫ	JOB:	/P Ø:3
	ИCX.	D	D	D	D	D	D
	СИСТ.	1	2	3	4	5	6
ИЗМ.ПАР->	0.	.05000	.05000	.05000	.05000	.05000	.05000
DSA /01	1.1771	07474	13286	01353	03457	01984	00597

Рис. 3.4 Таблица влияния на сферическую аберрацию толщин линз объектива

Коэффициент влияния для последней линзы объектива (позиция 6) будет равен $S_d = 0.05/0.0059 = 8.47$. Умножая рассчитанный коэффициент влияния на допустимый вклад погрешности, получим $\Delta d = S_d \times \Delta \mathrm{c} \varphi_i = 8.47 \times 18 = 152$ мкм. Округлив рассчитанный допуск до ближайшего значения из ряда $\pm (0.005; 0.007; 0.01; 0.015; 0.02; 0.025; 0.03; 0.05; 0.07; 0.1; 0.2; 0.5; 0.7; 1) мм, получим значение допуска на осевую толщину линзы равное <math>\pm 0.1$ мм.

4. РАСЧЕТ ДЕЦЕНТРИРОВОК ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЗ И ДОПУСКОВ НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОПРАВЫ

Децентрировки (несовпадение центров кривизны поверхностей линз с базовой осью корпуса объектива) приводят к появлению комы, предельное значение которой может быть рассчитано по формуле $\Delta k = 1.8 \, \lambda/A' = 5.8 \, \text{мкм}$. Так как объектив имеет 7 поверхностей, то вклад каждой из них можно оценить как $\Delta ki = \Delta k/\sqrt{7} = 2.2 \, \text{мкм}$. Расчет коэффициентов влияния децентрировок поверхностей склейки выполняется с помощью программы ОПАЛ. Вид окна ввода данных и таблицы результатов приведен на рис. 4.1 и 4.2.

```
SYSTEM: Индустар-50 f'=52 2ω=46 1:2.9 4линзы
—ST01FA07.VPA

nla=1;
МР(*)= DC:
МГ(*) = KD/01;
```

Рис. 4.1 Вид окна задания марок при расчете децентрировок

SYSTEM: Инду	јстар-50	f'=52	2 ⊮=4 6 1	:2.9 4ли	НЗЫ	JOB: VP	
	DC	DC	DC	DC	DC	DC	
	1	3	4	5	6	7	
изм.пар->	.01000	.01000	.01000	.01000	.01000	.01000	
KD /01	.00585	00555	00809	.00007	.00269	.00502	

Рис. 4.2 Таблица влияния на кому поперечного смещения сферических поверхностей объектива

Здесь «DC» — марка смещения сферической поверхности (по умолчанию равная 10 мкм), «KD/01» — марка комы, вызванной смещением оптической поверхности, для лучей, идущих через край зрачка. Марку «DC» можно применять, если оптическая система не имеет плоских преломляющих поверхностей. Если такие поверхности имеются, то лучше пользоваться маркой «Т», которая вводит наклон оптических поверхностей относительно их вершин. Переход к смещениям центра кривизны для сферических поверхностей тогда можно осуществить, воспользовавшись формулой $\Delta e_i = r_i \times \varepsilon$, где Δe — смещение центра кривизны поверхности, r — радиус поверхности, ε - наклон поверхности.

Коэффициенты влияния для поверхностей склейки (5, 6 и 7 поверхности) будут: $S\kappa_5 = 0.01/0.00007 = 142.8$, $S\kappa_6 = 0.01/0.0027 = 3.7$ и $S\kappa_7 = 0.01/0.005 = 2$. Отсюда определим допустимые суммарные децентрировки поверхностей как $\Delta e5 = S\kappa_5 \times \Delta ki = 314.2$ мкм, $\Delta e6 = S\kappa_6 \times \Delta ki = 8.1$ мкм и $\Delta e7 = S\kappa_7 \times \Delta ki = 4.4$ мкм.

Необходимо помнить, что на суммарную децентрировку поверхностей объектива влияет не только децентрировка, обусловленная ошибками

изготовления линз и склеек, но и погрешности размеров и взаимного положения поверхностей оправ.

Рассмотрим, выполняется ли для склейки принцип самоцентрирования — так как склейка опирается на края буртика 7-й поверхностью, то она является базовой и Dсв/2R7 = 17.8/47.2 = 0.37 > 0.3, что говорит о выполнении принципа самоцентрирования. Тогда на децентрировку поверхностей склейки будут влиять: разворот склейки в зазоре между оправой и склейкой ΔC , наклон опорного буртика оправы $\Delta \rho$, эксцентриситет светового отверстия оправы $\Delta \varepsilon$ (рис. 4.3).

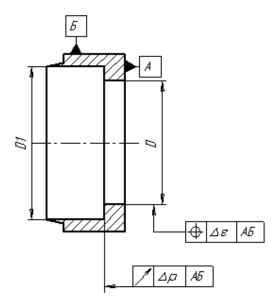


Рис. 4.3 Оправа склейки

Подробно рассмотрим, как эти погрешности оправы связаны с децентрировками поверхностей линзы, установленной в оправу.

Зазор ΔC между линзой и оправой необходим для компенсации температурного расширения оправы и линзы при изменении температуры и вызываемого этим изменением пережатия линзы. При выполнении принципа самоцентрирования происходит разворот линзы в зазоре (заклон) относительно центра кривизны базовой поверхности (рис. 4.4).

Разворот линзы можно определить по формуле $\varepsilon = \Delta C/2 \ Ra \sqrt{1 - \frac{D\pi^2}{4 \ Ra^2}}$. Смещение центра кривизны второй поверхности Б равно $\Delta e \delta = \varepsilon \ l = \varepsilon \ (Ra + R\delta - d)$, где Ra и $R\delta$ – радиусы кривизны линзы, d – толщина линзы по оси.

Неперпендикулярность поверхности опорного буртика базовой оси оправы $\Delta \rho$ тоже приводит к развороту линзы относительно точки пересечения базовой оси оправы и опорной плоскости буртика (рис.4.5). Так как расстояние между вершиной базовой поверхности линзы и указанной точкой мало, можно считать, что разворот происходит относительно вершины базовой поверхности. В этом случае децентрировки поверхностей

А и Б соответственно равны $\Delta ea=Ra\ \gamma=Ra\ \Delta\rho/D$ св и $\Delta e6=(R6-d)\gamma=(R6-d)\Delta\rho/D$ св.

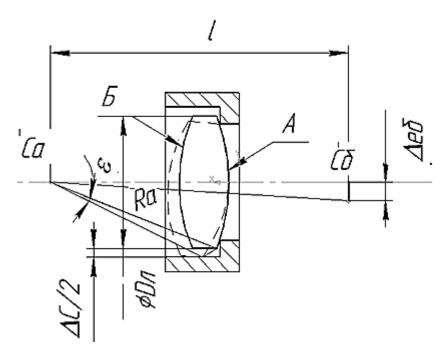


Рис. 4.4. Влияние заклона линзы в зазоре на децентрировку поверхности

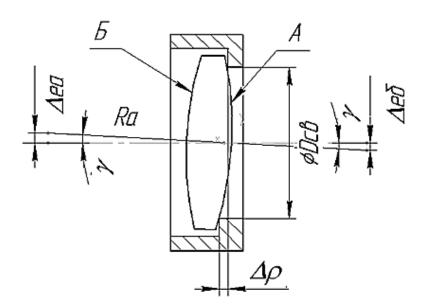


Рис. 4.5 Разворот линзы из-за неперпендикулярности опорного буртика базовой оси оправы

Эксцентриситет посадочного гнезда $\Delta \varepsilon$ вызван тем, что ось светового отверстия оправы не совпадает с базовой осью оправы (позиционный допуск на чертеже показывает, что расстояние между этими осями не должно превышать $\Delta \varepsilon$). Так как это приводит к смещению краев буртика, на которые опирается линза, то происходит ее смещение на величину эксцентриситета и тогда $\Delta e \alpha = \Delta e \delta = \Delta \varepsilon$ (рис. 4.6).

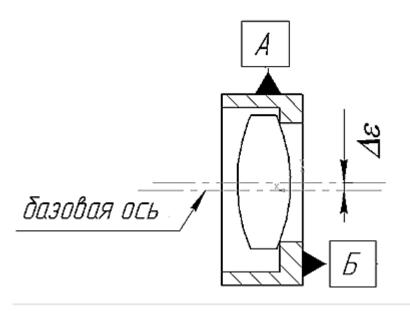


Рис. 4.6 Децентрировка линзы из-за эксцентриситета светового отверстия оправы

Если для базовой поверхности линзы или склейки не выполняется условие самоцентрирование или эта поверхность плоская, то при расчете надо учитывать следующие моменты:

- В этом случае не происходит разворота линзы в зазоре линза просто опускается до контакта со стенкой посадочного гнезда и децентрировка всех ее сферических поверхностей $\Delta e \approx \Delta C/2$;
- Эксцентриситет светового отверстия не приводит к децентрировке линзы, зато к ней приводит эксцентриситет посадочного гнезда оправы;
- Для плоских поверхностей децентрировкой является их наклон относительно базовой оси.

Децентрировки склейки объектива «Индустар-50», вызванные указанными первичными погрешностями, могут быть определены из следующих выражений:

Поверхность 7:

 $\Delta e \pi = 0$ — собственная децентрировка поверхности линзы из-за ошибки ее изготовления принимается равной 0, так как поверхность является базовой и самоцентрируется при контроле;

 $\Delta ec = 0$ — смещение центра кривизны базовой поверхности из-за разворота в зазоре равно 0, так как при выполнении принципа самоцентрирования разворот склейки произойдет относительно центра кривизны базовой поверхности без смещения последней;

 $\Delta e \rho \approx R7 \times \Delta \rho / D$ св — децентрировка, вызванная неперпендикулярностью буртика оправы к ее базовой оси;

 $\Delta e \varepsilon = \Delta \varepsilon$ — децентрировка из-за эксцентриситета светового отверстия оправы.

Сумма всех этих децентрировок должна быть равной $\Delta e7 = \sqrt{\Delta e \pi^2 + \Delta e c^2 + \Delta e \rho^2 + \Delta e \epsilon^2} = 4.4$ мкм. Полагая вклад первичных погрешностей одинаковым, получим

$$\Delta \varepsilon = \Delta e 7/\sqrt{2} = 3.1 \text{ MKM},$$

 $\Delta \rho = \Delta e 7 D c B / \sqrt{2} R 7 = 2.4 M K M.$

Поверхность 6:

∆ел – децентрировка изготовления поверхности;

 $\Delta ec = (R7 + R6 - d4) \Delta C/2 R7$ — децентрировка 6-й поверхности обусловленная разворотом склейки в зазоре относительно центра кривизны 7-й поверхности, d4 — толщина 4-й линзы;

 $\Delta e \rho \approx (R6-d4) \times \Delta \rho/D$ св — децентрировка 6-й поверхности из-за наклона опорного буртика оправы;

 $\Delta e \varepsilon = \Delta \varepsilon$.

 $\Delta e6 = \sqrt{\Delta e \pi^2 + \Delta e c^2 + \Delta e \rho^2 + \Delta e \epsilon^2} = 8.1$ мкм. Как и для 7-й поверхности получаем:

 $\Delta e \pi = \Delta e 6/2 = 4$ мкм;

 $\Delta C = 2\Delta e 6 R7/2(R7 + R6 - d4) = 5.6 \text{ MKM};$

 $\Delta \rho = \Delta e 6 D c B/2 (R6 - t4) = 7 MKM;$

 $\Delta \varepsilon = \Delta e 6/2 = 4 \text{ MKM}.$

Для 5-й поверхности получим:

 Δe л – децентрировка изготовления поверхности;

 $\Delta ec = (R7 + R5 - d4 - d3) \Delta C/2 R7$ — децентрировка 6-й поверхности обусловленная разворотом склейки в зазоре относительно центра кривизны 7-й поверхности, d4 — толщина 4-й линзы;

 $\Delta e \rho \approx (R5 - d4 - d3) \times \Delta \rho / D1$ — децентрировка 6-й поверхности из-за наклона опорного буртика;

 $\Delta e \varepsilon = \Delta \varepsilon$.

 $\Delta e 5 = \sqrt{\Delta e \pi^2 + \Delta e c^2 + \Delta e \rho^2 + \Delta e \varepsilon^2} = 142.8$ мкм. Как и для 7-й поверхности получаем:

 $\Delta e \pi = \Delta e 5/2 = 71$ мкм;

$$\Delta C = 2\Delta e 5 R7/2(R7 + R5 - d4 - d3) = 9.2 \text{ MKM};$$

$$\Delta \rho = \Delta e 6 \, D \, \text{CB} / 2 \, (R5 - d4 - d3) = 3.7 \, \text{мкм};$$

 $\Delta \varepsilon = \Delta e 6/2 = 71 \text{ MKM}.$

Анализ рассчитанных погрешностей показывает, что выдержать допуски в диапазоне менее 5 мкм трудно, поэтому добиться такой точности можно только применяя насыпную в оправах конструкцию. После установки склейки в оправу ее необходимо подвергнуть результативной обработке, что позволит минимизировать влияние погрешностей оправы и линзы и уложиться для 6-й и 7-й поверхностей в рассчитанные допуски. Сложнее с 5-й поверхностью – вывести ее центр кривизны на ось, содержащую центры кривизны 6-й и 7-й поверхностей трудно. Поэтому необходимо при изготовлении 4-й линзы, которая является базовой, сделать ее поверхность, идущую в склейку, как можно точнее и проставить на чертеже допуск на ее децентрировку порядка 5 мкм. Допуски $\Delta \rho$ и $\Delta \varepsilon$ на чертеже оправы тоже желательно задать не более 10 мкм.

При невозможности достижения требуемых децентрировок технологическим путем (ужесточением допусков на линзу и оправу) необходимо предусмотреть в конструкции объектива юстировочные поперечные подвижки одной из его линз, наиболее сильно влияющей на величину комы.

5. ПРОВЕРКА ВЫБРАННОЙ ПОСАДКИ ЛИНЗЫ В ОПРАВУ, ИСХОДЯ ИЗ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.

Так как допуски на центрирование линзы достаточно высоки, желательно задать допуск на диаметр посадочного отверстия оправы по H7, а на диаметр линзы — f7. Так как величина зазора является случайной величиной, зависящей от случайных погрешностей диаметров линзы и подчиняющейся закону Гаусса, то можно вычислить ее максимальное и минимальное значение вероятностным способом.

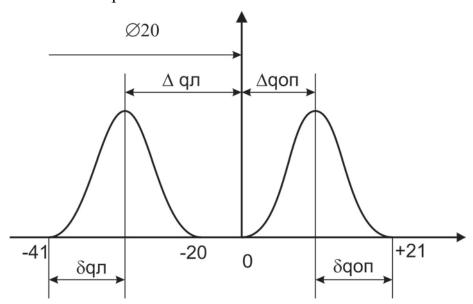


Рис. 5.1 Положение границ предельных отклонений погрешностей оправы и линзы

Допустим, что практические предельные рассеяния погрешностей диаметра линзы и посадочного гнезда оправы совпадают с границами поля допуска (рис. 5.1). Если полный диаметр линзы $D=20\,$ мм, то границы предельных отклонений диаметра линзы составят $-20\,$ и $-41\,$ мкм, а диаметра посадочного гнезда оправы $0\,$ и $+21\,$ мкм. Так как центры рассеяния погрешностей смещены относительно номинального значения размера, то при вычислении зазора нужно учитывать систематическую составляющую погрешности, введенную для получения гарантированного зазора.

систематической составляющей погрешности определить из выражения $\Delta q = (\Delta q B + \Delta q H)/2$, где $\Delta q B$ - верхняя граница Δq н — нижняя граница поля Для линзы поля допуска, допуска. погрешности $\Delta q \pi = (-20 +$ систематическая составляющая равна +(-41))/2 = -30.5 мкм. Для оправы систематическая составляющая погрешности равна Δq оп = (21+0)/2 = 10.5 мкм. Случайная составляющая погрешности равна для линзы δq л = $(\Delta q$ в – Δq н)/2 = ((-20-(-41)))/2 = = 10.5 мкм, а для оправы δq оп = $(\Delta q_B - \Delta q_H)/2 = (21 - 0)/2 = 10.5$ мкм.

Согласно вероятностному методу сложения погрешностей, систематические погрешности складываются алгебраически, а случайные – по методу квадратичного суммирования.

$$\Delta C = \sum_{i=1}^{n} |\Delta q_i| \pm \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \delta q_i}.$$

Тогда максимальная величина зазора будет равна $\Delta Cmax = |\Delta q\pi| + |\Delta q\sigma\pi| + \sqrt{\delta q\pi^2 + \delta q\sigma\pi^2} = 30.5 + 10.5 + 10.5 \times \sqrt{2} = 55.8$ мкм.

Минимальная величина зазора будет равна $\Delta Cmin = |\Delta q \pi| + |\Delta q \sigma \pi| + \sqrt{\delta q \pi^2 + \delta q \sigma \pi^2} = 30.5 + 10.5 - 10.5 \times \sqrt{2} = 26.9$ мкм.

Определим, насколько изменится зазор при изменении температуры. Фотообъектив должен функционировать в диапазоне температур от -40 до +50 С°. Принимая за номинальное значение температуры $t_0=20$ С°, получаем $\Delta t_1=t_{\rm B}-t_0=50-20=30$ С° и $\Delta t_2=t_0-t_{\rm H}=20-(-20)=40$ С°. Тогда изменение зазора

$$\delta\Delta C = (\alpha_{\pi} - \alpha_{\text{OH}})\Delta t D,$$

где α - коэффициенты линейного расширения (КЛР) материалов линзы и оправы, D — номинальный диаметр линзы и оправы. КЛР некоторых марок стекол и материалов оправ приведены в таблицах 1 и 2. Так как КЛР материалов оправ значительно превышает КЛР стекол, то при большом изменении температуры возможно как пережатие линз, что приводит к их деформации и увеличению аберрации, так и увеличение зазора, приводящее к большим децентрировкам.

Таблица 1. Коэффициенты линейного расширения некоторых марок стекол

таолица т. Коэффициенты линенного расширения некоторых марок стекол						
Magazz	КЛР в пределах температур С°					
Марка стекла	от – 60 до + 20	от + 20 до + 120				
К8	68×10^{-7}	76×10^{-7}				
TK14	63×10^{-7}	69×10^{-7}				
ЛФ5	67×10^{-7}	72×10^{-7}				
ОФ1	59×10^{-7}	63×10^{-7}				
Ф13	71×10^{-7}	75×10^{-7}				
ТФ10	75×10^{-7}	81×10^{-7}				
БК8	56×10^{-7}	62×10^{-7}				
ЛК7	40×10^{-7}	44×10^{-7}				

Таблица 2 Коэффициенты линейного расширения материалов оправ оптических систем

Материал оправы	КЛР
Латунь ЛС59-1	20.1×10^{-6}
Сплав алюминиевый Д1	22×10^{-6}
Сплав алюминиевый Д16	22.7×10^{-6}
Сплав алюминиевый В95	3.6×10^{-6}
Сплав алюминиевый литейный АЛ9	23×10^{-6}
Сталь 20	11.1×10^{-6}
Сталь 30	12.6×10^{-6}
Титан	8.15×10^{-6}

Так как КЛР материалов оправ значительно больше КЛР стекол, то пережатие линз возможно при уменьшении температуры. Из линз склейки меньшее значение КЛР имеет линза из стекла ОФ1, кроме того она является базовой в склейке и определяет ее положение. Предположим, что материалом оправы является широко распространенный алюминиевый сплав Д16. Тогда изменение зазора при изменении температуры на $-40~\rm C^\circ$ составит $\delta\Delta C=(227\times 10^{-7}-59\times 10^{-7})\times 40\times 20=13.4$ мкм. Так как $\Delta Cmin>\delta\Delta C$, то можно считать, что зазор выбран правильно и пережатия линзы не происходит. При невыполнении этого условия необходимо задавать более широкий допуск на диаметры линзы и посадочного гнезда оправы либо задать другую посадку, например H7/e7. Для допуска e7 поле допуска для линзы будет сдвинуто на -20 мкм относительно поля допуска f7, что приведет к увеличению зазора на 10 мкм.

6. ВЫБОР ДОПУСКОВ НА МАТЕРИАЛ ПРИЗМЫ, ЕЕ РАЗМЕРЫ И ФОРМУ ПОВЕРХНОСТЕЙ

6.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ ПРИЗМЫ И ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ МАТЕРИАЛУ

В качестве примера рассчитаем допуски на призму AP-90, выполненную из стекла K8 и установленную за объективом, расчет допусков которого выполнялся в предыдущей части учебного пособия. Расчет начинается с определения светового диаметра призмы, который можно определить геометрическим способом, зная световой диаметр последней поверхности линзы объектива и угол поля зрения объектива (рис. 6.1). Для этого зададим расстояние от последней поверхности объектива до призмы L и рассчитаем световой диаметр призмы по формуле

$$D_{CB} = \frac{2(h + L tg(w))}{1 - 2 k tg(w/n)},$$

где $tg(w) = (h_{\rm из} - h)/S_{F'}$ — половина угла конуса, внутри которого проходят лучи от последней поверхности объектива до поверхности призмы, $h_{\rm из} = tg(\omega)f'$ - высота изображения, ω - угловое поле изображения, L — расстояние от последней поверхности объектива до входной грани призмы, n — показатель преломления материала призмы, h — световая высота последней поверхности объектива, k = l/D — отношение длины хода осевого луча в призме к ее полному диаметру (коэффициент берется из таблицы в работе [4] на стр. 170-179).

Для призмы AP-90, установленной на расстоянии L=10 мм за последней поверхностью объектива «Индустар-50» (h=8.9 мм, $\omega=23^\circ, f=52$ мм) с коэффициентом k=1 и выполненной из стекла К8 (n=1.513) получим tg(w)=0.297 и световой диаметр Dcв = 40 мм. Тогда длина хода осевого луча в призме и толщина ее развертки (при равенстве светового и полного диаметров) равна 40 мм.

Так как расчет габаритов призмы был приблизительным, желательно уточнить их с помощью ОПАЛа, задав на расстоянии 10 мм от последней поверхности объектива плоскопараллельную пластину толщиной 40 мм из стекла К8. Расчет показывает, что световой диаметр на грани призмы равен 38 мм. Так как полный диаметр должен быть больше светового, чтобы обеспечить возможность крепления призмы, полный диаметр следует оставить равным 40 мм.

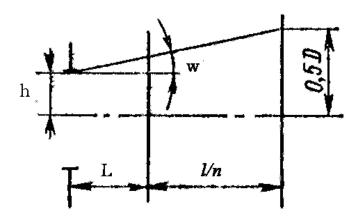


Рис. 6.1 Определение светового диаметра призмы

Если у призмы две или три отражающих грани, и она имеет крышу, выходящую только на одну преломляющую грань (входную или выходную), то надо брать размер

$$D = \frac{D}{2} \left(1 + \frac{\sqrt{1 + \sin(\gamma)^2}}{\sin(\gamma)} \right),$$

где ү - угол между ребром крыши и выходной (входной) гранью.

Для призмы с одним отражением, у которой крыша выходит на обе преломляющие грани, (например, призма $A_{\kappa}P$ -90) световой диаметр вычисляется по формуле

$$D = D \frac{\sqrt{1 + \sin(\gamma)^2}}{\sin(\gamma)}.$$

Для определения требований к материалу призмы рассмотрим, как изменятся аберрации объектива после установки за ним плоскопараллельной пластины, полученной разверткой призмы. Анализ таблицы изменения сферической аберрации от изменения показателя преломления (рис. 6.2) показывает, что влияние пластинки (деталь N28) на два порядка меньше чем у линз, что позволяет назначить на призму по показателю преломления допуск 5Γ .

SYSTEM: Инду	стар-50	f'=52	2w=46 1:	2.9 4лин	1361	JOB: VP
	ИCX.	N	N	М	N	N
	СИСТ.	1	3	5	6	8
ИЗМ.ПАР->	0.	.00050	.00050	.00050	.00050	.00050
DSA /01	1.4457	02115	.03473	.03110 -	.04274	.00005

Рис. 6.2 Изменение сферической аберрации при отклонении показателя преломления

Для хроматической аберрации положения таблица, связывающая ее изменение с изменением дисперсии, приведена на рис. 6.3. Из нее видно, что вклад в аберрацию у пластины меньше, чем у линз. Коэффициент влияния для пластины будет равен $S_{\Delta(nF'-nC')} = 5 \times 10^{-5}/0.0011 = 4.5 \times 10^{-2}$. Предельное значение хроматической аберрации положения может быть вычислено из выражения $\Delta xp = \lambda \ cp/A'^2 = 19 \ мкм$. Так как вклад в аберрацию

вносят 4 линзы и пластина, то вклад каждой из них составит $\Delta x p_i = \Delta x p / \sqrt{5} = 8.5$ мкм. Допуск на дисперсию составит $\Delta (n_f, -n_{c'}) = S_{\Delta(nF'-nC')} \times \Delta x p_i = 4.5 \times 10^{-2} \times 8.5 \times 10^{-3} = 38.25 \times 10^{-5}$, что значительно больше, чем самый жесткий допуск из таблицы 1 раздела 2. Поэтому имеет смысл назначить допуск по дисперсии 5Γ .

SYSTEM: Индустар-50	of'=52	2 ⊮=4 6 1	:2.9 4ли	НЗЫ	JOB: V
ИCX.	ND	ND	ND	ND	ND
СИСТ.	1	3	5	6	8
ИЗМ.ПАР-> 0	00005	.00005	.00005	.00005	.00005
DSA /'1 .69225	500974	.01168	.00914	01466	.00109

Рис. 5.3 Таблица изменения хроматической аберрации положения от изменения дисперсии стекла призмы

Выбор категории стекла по оптической однородности и показателю ослабления рекомендуется назначать по 3-й категории, что превышает требования к стеклам линз объектива. Это обусловлено тем, что длина хода луча в призме в несколько раз больше длины хода луча в объективе.

Требования по двулучепреломлению можно определить исходя из следующих соображений — если считать, что аберрации системы малы и среднеквадратичное отклонение волнового фронта за призмой не превышает W скв $\leq \lambda/14$, то можно воспользоваться приближенной формулой $\Delta = \frac{0.56 \, \lambda}{l} \, \sqrt{1-S}$, где l — длина хода осевого луча в призме, $S \approx 1 - (2\pi/\lambda)^2 W^2$ скв — число Штреля. Для нашего случая при $S \approx 0.8$, l=4 см, $\lambda = 0.55 \times 10^{-3}$ мм получаем $\Delta = 34$ нм/см, что соответствует 5-й категории стекла по двулучепреломлению. Так как кроме двулучепреломления стекла оптическая система содержит довольно много источников аберраций, желательно ужесточить допуск к стеклу призмы по двулучепреломлению до 3-й категории, как и рекомендовано в литературе [1,2,7].

По свильности, следуя рекомендациям в [1] и учитывая небольшое расстояние между плоскостью приемника и выходной гранью призмы, следует назначить допуск, соответствующей 1 категории и классу А.

Минимальный диаметр пузыря можно определить из формулы d=2 S'A' $\sqrt{\Delta E/E\pi}$, где $\Delta E/E\pi$ — пороговая относительная чувствительность приемника к изменению освещенности (для ПЗС приемника ≈ 0.05), A' — задняя апертура объектива, за которым установлена призма (для объектива «Индустар-50» A'=0.172), S' — расстояние от выходной грани призмы до плоскости изображения (S' = 7.5 мм). Подстановка в формулу дает $d \approx 0.5$ мм, что соответствует стеклу 5-й категории по пузырности. При выполнении этого условия в плоскости изображения будут отсутствовать тени от пузырей.

Класс по пузырности при известной категории лучше выбрать наименьший из возможных для стекла данной марки [2]. Согласно данным из

работы [4] при варке стекла марки К8 можно получить классы пузырности А – В, поэтому выбираем класс А.

6.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКОВ НА ОБЩУЮ И МЕСТНУЮ ОШИБКИ ПРЕЛОМЛЯЮЩЕЙ И ОТРАЖАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИЗМЫ

Определим допуски N и ΔN на преломляющие и отражающие поверхности. Отклонение отражающих поверхностей от плоскостности N приводит к появлению астигматизма на оси. Нарушение сферичности отражающих поверхностей ΔN тоже приводит к появлению астигматизма на оси оптической системы.

Предельное значение допуска на астигматизм может быть определено из выражения $\Delta(x'_m - x'_s) = 0.68 \, \lambda/A'^2 = 0.68 \times 0.55/0.029 = 12.9 \,$ мкм. Установив призму, мы внесли в систему еще три поверхности, поэтому вклад каждой из них можно оценить из выражения $\Delta_i(x'_m - x'_s) = \Delta(x'_m - x'_s)/\sqrt{10} = 4.1 \,$ мкм.

Допуск на общую ошибку отражающей поверхности можно определить из формулы:

$$N = \frac{227 D^2}{n a^2 \sin(\alpha) t g(\alpha)} \Delta_i (x'_m - x'_s),$$

где D — световой диаметр поверхности, α - угол падения осевого луча на отражающую поверхность, a=l/2+S' — расстояние от отражающей поверхности до фокальной плоскости, l — длина хода луча в призме, S' — расстояние между выходной гранью призмы и фокальной плоскостью. В нашем случае D=38 мм, $\alpha=45^\circ$, $a\approx27.5$ мм. После подстановки в формулу получаем $N\approx1$. Величину местной ошибки отражающей поверхности можно вычислить с помощью формулы

$$\Delta N = \sin(\alpha)^2 N \approx 0.5 N = 0.5.$$

Здесь ошибка ΔN учитывает только разность радиусов кривизны отражающей поверхности в меридиональной и сагиттальной плоскостях, и не учитывает локальные ошибки, приводящие к деформации волнового фронта, поэтому допуск можно ужесточить до $\Delta N=0.2$.

Расчет допусков на N и ΔN преломляющих поверхностей призмы можно проводить аналогично расчету допусков на поверхности линз объектива. Отклонение N приводит к появлению сферической аберрации. Анализ коэффициентов влияния показывает, что отклонение преломляющих поверхностей призмы от плоскостности на 3 кольца вызывает продольную сферическую аберрацию порядка 0.08 мкм, что на порядок меньше, чем влияние общей ошибки изготовления поверхностей линз объектива. Поэтому

на эти поверхности можно задать допуск N=4. Допуск ΔN определяется по формуле $\Delta N_i = \frac{D_i^2 \, \Delta_i (x'_m - x'_s)}{\frac{h_i}{h_1} \, 4 \, (n'_i - n_i) \, f'^2 \, \lambda}$, которая уже использовалась при определении

допуска ΔN сферических поверхностей. Вычислив в ОПАЛ высоты встречи апертурного луча с поверхностями и их световые диаметры, получим для входной грани призмы $\Delta N = 1$ и для выходной грани призмы $\Delta N > 10$.

Широкий допуск ΔN на выходную грань призмы объясняется тем, что она находится очень близко от плоскости формирования изображения, и для нее световой диаметр D=38 мм, а рабочий диаметр (диаметр осевого пучка) $Dp=1.5\,$ мм. Согласно работе [11], допуск на несферичность (астигматичность) поверхностей в пределах светового диаметра увеличивают на величину квадрата отношения светового диаметра к рабочему диаметру пучка лучей $\Delta N=\Delta N p~(D/Dp)^2$, где $\Delta N p~$ допуск на отклонение формы поверхности в зоне рабочего пучка ($\Delta N p\approx 0.5$).

Так как допуски преломляющих поверхностей ΔN рассчитывались исходя только из астигматизма, без учета влияния на другие аберрации, имеет смысл ужесточить их до $\Delta N=0.5$.

На чистоту поверхности допуск назначим исходя из рекомендаций, приведенных в таблице 3 раздела 3. Так как призма размещена в сходящемся пучке лучей, рекомендуется назначить 4 класс по чистоте поверхности.

Допуск на линейные размеры призмы обычно задается по 12 квалитету, так как погрешности этих размеров не влияют на качество изображения, а приводят только к расфокусировке, которая может быть легко скомпенсирована.

6.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКОВ НА ОШИБКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УГЛОВ ПРИЗМ И НА ПИРАМИДАЛЬНОСТЬ

Вследствие неточного изготовления углы реальной призмы отступают от заданных величин, а ее ребра не параллельны друг другу, т.е. имеется пирамидальность. Поэтому развертка призмы представляет собой комбинацию плоскопараллельной пластины и клина с малым преломляющим углом θ . Суммарную клиновидность развертки призмы можно вычислить по формуле $\theta = \sqrt{\theta_i^2 + \theta_\pi^2}$, где θ_i – клиновидность развертки, обусловленная ошибками изготовления углов призм, θ_π - клиновидность, обусловленная прирамидальностью призмы.

На примере призмы AP-90 рассмотрим, погрешность изготовления каких углов приводит к клиновидности развертки призмы. Пусть угол призмы в 90° имеет ошибку $\Delta \gamma$, а разность углов призмы в 45° δ_{45} = 0. В этом

случае развертка не будет клиновидной, но получит разворот относительно оптической оси объектива на угол $\Delta \gamma/2$ (рис. 6.4).

Смещение линии визирования в этом случае будет равно $\Delta S = \frac{n-1}{n} d \frac{\Delta \gamma}{2}$. Если в качестве приемника используется ПЗС-матрица с размером пиксела t = 8 мкм, допуск составит $\Delta \gamma = 2 t n/d (n-1) = 0.96 \times 10^{-3} = 3.2'$. В случае, когда $\delta_{45} = \Delta \alpha - \Delta \beta \neq 0$ угловое смещение линии визирования составит $\varphi = \Delta \gamma - n (\Delta \alpha - \Delta \beta)$.

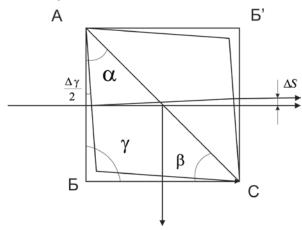


Рис. 6.4 Влияние ошибки прямого угла призмы АР-90 на отклонение падающего луча

Клиновидность развертки призмы будет определяться разностью углов призмы в 45° $\theta_i = \alpha - \beta = \Delta \alpha - \Delta \beta = \delta_{45}$ (рис. 6.5).

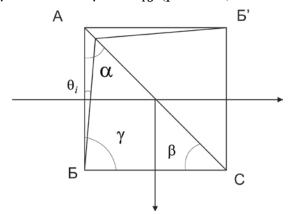


Рис. 6.5 Влияние разности углов в 45° на клиновидность развертки призмы AP-90

Отклонение луча клином в этом случае будет равно $\delta = \theta_i \, (n-1).$

Для расчета клиновидности, вызванной пирамидальностью призмы, удобно пользоваться инвариантом пирамидальности [9], который имеет вид $\delta_{k+1} = \delta_k \, n_k/n_{k+1} - (n_k cos \varphi_k - n_{k+1} cos \varphi'_k) \Delta_k/n_{k+1}$, где δ - отклонение луча в плоскости, перпендикулярной главному сечению призмы, Δ - отклонение от перпендикулярности преломляющей или отражающей грани призмы ее главному сечению, φ и φ - углы падения и отражения (преломления) осевого луча в главном сечении.

При применении указанной формулы необходимо придерживаться ряда правил:

- 1. Полагая главное сечение призмы расположенным вертикально, нужно считать отклонения лучей и перпендикуляров от этого сечения вправо положительными, а влево отрицательными. Тогда δ и Δ будут положительны;
- 2. Значение δ_1 можно принять равным 0 (неперпендикулярность падающего луча входной грани), но целесообразно этого не делать, так как это позволит оценить возможность компенсации пирамидальности призмы ее разворотами;
- 3. В случае отражающей поверхности следует считать n' = -n;
- 4. При переходе от преломляющей поверхности к следующей поверхности следует считать $\delta = \delta'$;
- 5. При переходе от отражающей поверхности к следующей поверхности следует считать $\delta = -\delta'$;
- 6. Полученное значение δ для последней поверхности является отклонением выходящего из призмы луча от главного сечения призмы.

Применим инвариант для поверхностей призмы АР-90.

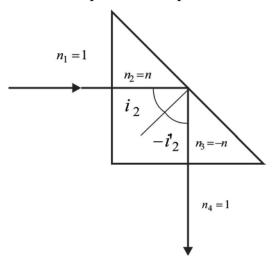


Рис. 6.6 Применение правила знаков для прямоугольной призмы при расчете инварианта пирамидальности

Для первой (преломляющей) поверхности исходные данные для расчета будут иметь вид: $n_1=1,\ n_2=n,\ \phi=\phi'=0,\ \Delta_1,\ \delta_1.$ Подставляя в инвариант, получим $\delta_2=(\delta_1+(n-1)\ \Delta_1)/n.$

Для второй (отражающей) поверхности исходные данные для расчета будут иметь вид: $n_2=n,\,n_3=-n,\,\phi=\phi'=45^\circ,\,\Delta_2,\,\delta_2.$ Подставляя в инвариант, получаем $\delta_3=-\delta_2+2\cos 45^\circ\,\Delta_2.$

Для третьей (преломляющей) поверхности: $n_3 = n$, $n_4 = 1$, $\varphi = \varphi' = 0$, Δ_3 , $-\delta_3$. $\delta_4 = -\delta_3 n - (n-1)\Delta_3$ (рис. 6.6).

Объединяя все три формулы, получим $\delta_4 = \delta_1 + (n-1)(\Delta_1 - \Delta_3) -2n\cos 45^\circ$ Δ_2 . Разность $\Delta_1-\Delta_3\approx 0$, ошибку угла падения на входную грань призмы δ_1 тоже можно задать равной 0. Тогда $\delta_4 = -2n\cos 45^\circ \Delta_2 =$ пирамидальностью призмы AP-90 можно отражающей параллельность гипотенузой грани призмы образованного пересечением преломляющих граней $\Delta_2 = \pi$. клиновидность развертки в плоскости, перпендикулярной главной, будет $\theta_{\pi}=2cos45^{\circ}\,\pi=\sqrt{2}\,\pi$, где π - пирамидальность призмы. В данном случае угол клина получают делением угла отклонения луча на значение показателя преломления, т.к. клин в этом случае является воздушным.

Клиновидность развертки призмы приводит к появлению хроматических аберраций и комы в плоскости изображения. Хроматизм в линейной мере на приемнике может быть определен из формулы $\Delta L_{FC} = (l+S')\,\theta\,(n-1)/\nu$, где S' – расстояние от выходной грани призмы до плоскости приемника, l – длина хода луча в призме; ν - коэффициент средней дисперсии, значение которого для стекла К8 составляет ν = 64.1. Если в качестве приемника используется ПЗС-матрица, то величина хроматизма не должна превышать размера одного пиксела этой матрицы $t = \Delta L_{FC}$ и тогда $\theta = t\,\nu/(S'+l)\,(n-1)$. Принимая влияние пирамидальности и разности углов призмы на хроматизм одинаковым $\theta_i = \theta_\pi$, получаем $\delta_{45} = \theta_i = \theta/\sqrt{2}$ и $\pi = \theta_\pi/\sqrt{2} = \theta/2$.

Так как расстояние (S'+l) небольшое, то допуск на клиновидность развертки, и соответственно разность углов δ_{45} и пирамидальность π может быть задан в широких пределах $\delta_{45} \geq 10'$ и $\pi \geq 10'$. Желательно назначать допуски на углы призм в диапазоне от 1' до 10'.

Для визуальной системы, когда изображение наблюдается через окуляр, необходимо принять $\Delta L_{FC} = f_{\text{ок}} \, \varepsilon$, где ε - разрешающая способность глаза.

В случае, если призма стоит в широком пучке лучей перед объективом, угловой хроматизм составит $\omega_{FC} = \theta \ (n-1)/\nu$, и в задней фокальной плоскости объектива линейный хроматизм будет равен $\Delta L_{FC} = f' \ \theta \ (n-1)/\nu$.

Определим допуск на клиновидность и пирамидальность призмы, исходя из величины комы $\Delta k = -\frac{3}{2} \, \theta \, \frac{n^2-1}{n} \, S' \, A'^2$. Ранее было установлено, что вклад каждого компонента оптической системы в эту аберрацию не должен превышать 2 мкм. Тогда $\theta = \frac{2 \, \Delta k \, n}{3 \, (n^2-1) S' A'^2} \approx 0.037$ рад или 2°, откуда следует, что на величину комы отклонения углов призмы влияют слабо.

Погрешность угла крыши призмы $\Delta \varphi$ приводит к двоению изображения, т.к. отклонение от расчетного направления осевого луча в прямом и обратном ходе составит $\Delta \delta = 4 \ n \ \Delta \varphi \ cos \ (i)$, где i – угол падения луча на грань крыши. Если призма установлена за объективом, то сдвиг

изображения (двоение) в его фокальной плоскости будет равен $\Delta = \Delta \delta \ (l_1/n + S')$ (рис. 6.7). Если в фокальной плоскости объектива стоит ПЗС, этот допуск не должен превышать половины размера пиксела $\Delta = t/2$. Для визуальной системы (изображение рассматривается через окуляр) $\Delta = f_{\rm ok} \ \epsilon/2$, где ϵ - разрешающая способность глаза. Как правило, допуск на угол крыши не превышает 2-5".

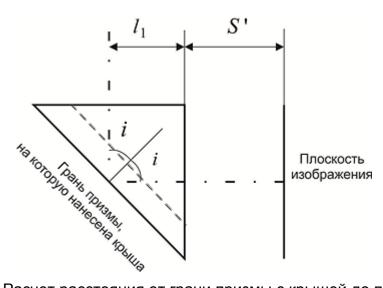


Рис. 6.7 Расчет расстояния от грани призмы с крышей до плоскости изображения

Также при ошибке изготовления угла крыши появляется хроматизм, величина которого в угловой мере может быть оценена из формулы $\Delta \delta_{FC} = 4 \, \Delta \varphi \, cos \, (i) \, (n-1)/\nu$. Так как исходя из двоения изображения допуск на угол крыши призмы очень жесткий, то окрашивание изображения из-за хроматизма слабое.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИНЗОВЫЕ СИСТЕМЫ

В процессе выполнения курсового проекта требуется разработать конструкцию узла крепления линзовой системы. Конструкция должна предусматривать: возможность контроля оптических и механических характеристик узла; использование типовых конструктивных решений. Задание включает сборочный чертеж объектива и чертежи деталей и подсборок – оправы, склейки и одиночной линзы.

В конструкции микрообъектива необходимо предусмотреть:

- Соединение микрообъектива с тубусом микроскопа;
- Поперечное смещение второго компонента микрообъектива для компенсации децентрировок;
- Изменение воздушного промежутка между вторым и третьим компонентами микрообъектива.

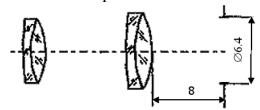
В конструкции фотообъектива необходимо предусмотреть:

- Возможность установки объектива в фотоаппарат по резьбе (M39×1 или M42×1) или с помощью байонетного соединения;
- Возможность компенсации децентрировок.

Для окуляров предусмотреть фокусировку в пределах ± 5 дптр.

1.1 ОБЪЕКТИВЫ МИКРОСКОПОВ

1. Объектив-ахромат 8×0.2

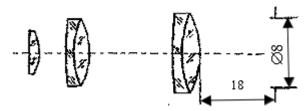


Технические характеристики объектива: длина тубуса 160 мм, фокусное расстояние 18 мм, рабочее расстояние 8.6 мм.

Конструктивные параметры объектива						
r MM	r мм d мм Марка стекла Световой \varnothing м					
∞	1	ТФ1	5.8			
8.95	2	КФ4	6.3			
-8.93	13.73	Воздух	6.3			
144.4	1	ТФ1	7.5			

13.67	2	КФ4	7.6
-13.81			7.6

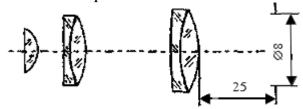
2. Объектив-ахромат 20×0.4



Технические характеристики объектива: длина тубуса 160 мм, фокусное расстояние 8.4 мм, рабочее расстояние 1.7 мм.

Конструктивные параметры						
r MM	d mm	Марка стекла Световой ∅				
∞	2	БК2	2.7			
-4	1.2	Воздух	3.7			
∞	1.5	ТФ1	4.4			
6.5	1.6	БК2	5			
-7.47	7.4	Воздух	5.1			
53.23	1	ТФ1	6.3			
8.56	1.8	БК2	6.5			
-10.51			6.5			

3. Объектив ахромат 40×0.65

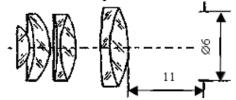


Технические характеристики объектива: длина тубуса 160 мм, фокусное расстояние 4.25 мм, рабочее расстояние 0.7 мм.

Конструктивные параметры					
r MM	d mm	Марка стекла	Световой ∅ мм		
∞	1.72	К3	1.6		

-1.85	0.22	Воздух	3
∞	1.3	ТФ2	3.4
4.17	1.5	К3	3.8
-4.6	3.42	Воздух	3.8
26.53	1	Ф2	5.3
5.59	1.8	К3	5.8
-7.98			5.8

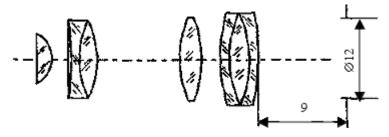
4. Объектив-ахромат 90×1.25 масляной инверсии



Технические характеристики объектива: длина тубуса 160 мм, фокусное расстояние объектива 1.96 мм, рабочее расстояние 0.1 мм.

Конструктивные параметры						
r MM	d mm	Световой ∅ мм				
00	0.92	К20	1			
-0.78	0.05	Воздух	1.55			
-7.88	1	К5	2.5			
-2	0.2	Воздух	3			
-34.015	1	ТФ1	3.4			
5.29	1.75	К2	4			
-4.02	1.49	Воздух	4.4			
101.8	1	ТФ4	4.6			
5.86	4.5	К5	4.6			
-7.44			4.8			

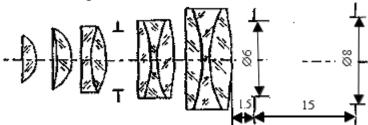
5. Объектив-апохромат 20×0.65



Технические характеристики объектива: длина тубуса 160 мм, фокусное расстояние 8.43 мм.

Конструктивные параметры					
r MM	d mm	Марки стекол	Световые Ø мм		
∞	4	TK1	3		
-3.8	0.56	Воздух	5		
-32	2.5	БК9	7		
8.52	2.4	Флюорит	7.7		
-7.28	7.5	Воздух	7.7		
70	2	К8	11		
-13.15	0.5	Воздух	11		
76.25	1	К8	11		
9.18	3.6	Флюорит	10.3		
-9.18	1	КФ1	10.3		
-64.1			10.3		

6. Объектив-апохромат $60 \times (1 \div 0.7)$

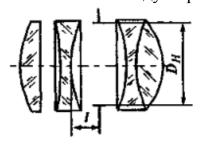


Технические характеристики объектива: длина тубуса 160 мм, диаметр ирисовой диафрагмы при $A=1,\,D=4.6$ мм, при $A=0.7,\,D=3.2$ мм.

Конструктивные параметры					
r MM	d mm	Марка стекла Световой 🛭			
∞	1.3	Кедровое масло	1.4		
-1.087	0.047	К20	2.2		
-11.092	1.376	Воздух	3.1		
-2.759	0.25	К3	3.4		
∞	0.908	Воздух	4.5		
6.8	2.6	БФ27	4.7		
-4.808	1.1	Флюорит	5		
∞	2.35	Воздух	5		
-5.008	1.1	Флюорит	5.2		
5.680	2.6	ЛФ1	5.5		
-12.82	0.02	Флюорит	5.7		
∞	2.03	K15	5.7		
-7.029	1.2	Квасцы	6.2		
7.029	2.4	КФ4	6.2		
-112.98			6.5		

1.2 ФОТООБЪЕКТИВЫ

1. Фотообъектив «Индустар»



Вариант 1 исполнения фотообъектива «Индустар»

Конструктивные параметры						
						Св. ∅ мм
21	40	8.1	57.68	8.4	TK16	47.6

∞	9.3	Воздух	45.5
-129.37	4	ЛФ5	41.5
52.49	12.2	Воздух	39.5
-407.21	3	ОФ1	40.5
54.05	11.2	ТК20	41.5
-83.53			41.6

Вариант 2

Конструктивные параметры										
<i>F'</i> мм	D _н мм	l mm	r MM	d mm	Марка стекла	Св. Ø мм				
		17.1	2.7	TK14	16					
			∞	4.16	Воздух	16				
			-33.57	1.05	ЛФ5	14				
52.39	11.8	2.3	14.56	5.05	Воздух	14				
			346.7	1.2	ОФ1	14				
			15	4.7	TK14	14				
			-23.6			14				

Вариант 3

	Конструктивные параметры									
<i>F</i> 'мм	D _Н мм	l mm	r MM	d mm	Марка стекла	Св. Ø мм				
		25.84	3.19	TK5	22.2					
			∞	3.69	Воздух	22.2				
			-58.42	1.8	ЛФ6	20.3				
100	19.5	2.33	23.89	4.67	Воздух	20.3				
			-137.01	1.7	БК4	20.3				
			21.93	4.59	TK5	20.3				
			-35.63			20.3				

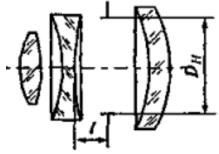
Вариант 4

Конструктивные параметры									
<i>F'</i> мм	D _н мм	l mm	r mm	r mm d mm		Св. Ø мм			
			52.36	7.5	TK10	42.8			
		368.1	6.9	Воздух	42.8				
			-133.7	3.2	ЛФ5	36.4			
213.8	34.4	43	46.88	6.2	Воздух	36.2			
			-518.8	2.1	КФ3	34.6			
			38.11	9.6	БФ11	36			
			-76.91			36			

Вариант 5

	Конструктивные параметры										
<i>F'</i> мм	D _Н мм	l mm	r mm	d mm	Марка стекла	Св. Ø мм					
		82.41	12	TK16	66.7						
			∞	12.5	Воздух	65					
			-193.2	6	ЛФ5	59.5					
300	57.5	11.7	74.47	19.7	Воздух	56.5					
			-608.1	4.2	ОФ1	58.4					
			75.86	15.9	TK20	59.6					
			-121.06			60					

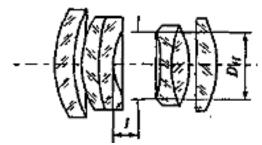
2. Фотообъектив «Триплет»



Технические характеристики объектива: фокусное расстояние 600 мм, l=12.2 мм, $\mathrm{D_H}=44.8$ мм.

Конструктивные параметры								
r mm	d mm	Марка стекла	Св. Ø мм					
81.34	15	TK3	50					
617	1.9	Воздух	50					
-316.48	6.5	ЛФ10	47					
76	24.4	Воздух	44.6					
-159	8	ЛФ7	50					
277.5			50					

3. Фотообъектив «Гелиос 32»



Технические характеристики объектива: фокусное расстояние 15 мм, l=1.3 мм, $D_{\rm H}=5.16$ мм.

Конструктивные параметры									
r MM	d mm	Марка стекла	Св. Ø мм						
7.64	1.56	TK17	7.5						
8.12	0.06	Воздух	7.2						
6.22	1.41	ТК20	6.8						
16.57	0.58	Ф1	6.2						
3.32	2.47	Воздух	5.1						
-4.75	0.59	Ф2	5.75						
19.68	1.63	БФ11	5.75						
-5.56	0.06	Воздух	6						
90	1.17	TK17	6.5						
-9.39			6						

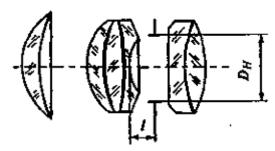
4. Фотообъектив «Мин»



Технические характеристики объектива: фокусное расстояние — 20 мм, l=0.9 мм, $\mathrm{D_H}=16.5$ мм.

Конструктивные параметры									
r MM	d mm	Марка стекла	Св. Ø мм						
55.98	8.21	ЛФ5	60.42						
137.4	0.09	Воздух	56.36						
25.32	1.65	CTK12	36.76						
12.445	7.8	Воздух	24.48						
21.43	1.21	CTK12	23.66						
10.54	7	Воздух	19.36						
130.32	2.21	СТК3	18						
11.117	8	ЛФ5	14.8						
-155.96	0.98	Воздух	15.92						
31.33	7.58	ТК13	16.42						
20.14	4	Воздух	14.66						
-21.09	1.05	ТФ7	14.96						
34.43	1.52	Воздух	15.36						
503.5	3.66	ТК20	16						
-22.23	2.4	Воздух	16.02						
-164.82	2.4	ТК16	17.1						
-43.05	0.1	Воздух	17.86						
-340.4	2.4	ФК14	18.58						
-35.97			19.23						

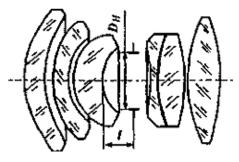
5. Фотообъектив «Юпител = 8»



Технические характеристики объектива: фокусное расстояние 52.39 мм, l = 3,75 мм, $D_{\rm H}$ = 16.7 мм.

Конструктивные параметры									
r MM.	d MM.	Марки стекол	Св. ∅ мм.						
26.425	4.2	ТК16	29						
91.79	0.25	Воздух	28.2						
17.378	4	TK21	24.2						
34.69	3.5	ЛК8	22.8						
-394.9	1	ТФ2	20.9						
11.832	5	Воздух	16.8						
-91.79	2.2	К5	16.6						
18.113	9.7	TK21	16.2						
-45.08		Воздух	20.3						

6. Фотообъектив «Волна»

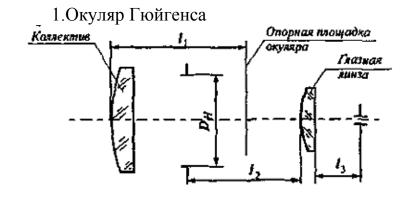


Технические характеристики объектива: фокусное расстояние объектива 53 мм, l=44 мм, $\mathrm{D_H}=20.06$ мм.

Конструктивные параметры							
r мм d мм Марка стекла Св. \varnothing мм							
35.89	5.1	СТК9	35.2				

93.97	0.1	Воздух	33.32
27.29	2.15	Ф9	29.08
16.032	2.57	Воздух	25.06
16.982	7.9	СТК9	24.8
15.885	8.77	Воздух	20.16
-20.08	2.6	Ф9	19.84
35.56	7.45	Воздух	22.6
-29.11	0.1	TK14	23.76
113.76	4.9	СТК9	24.66
-45.5			24.8

1.3 ОКУЛЯРЫ



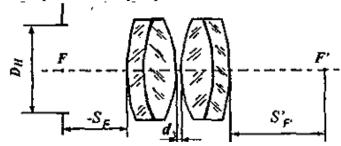
Вариант исполнения 1.

	Конструктивные параметры											
<i>F</i> ' мм	Γ	<i>R</i> мм	D mm	D_H	L_{l} MM	L_2 MM	L_3 MM	Марка стекла	CB. Ø			
		18.66 ∞	3 16.8					ТФ1	15			
16.9	15	7.41 ∞	1.5	6.7	24	14.1	6.5	К8	7			

Вариант исполнения 2

	Конструктивные параметры											
F'MM	Γ	r MM	d mm	D_H	L_{l} MM	L_2 MM	L_3 MM	Марка стекла	Св. Ø мм			
	1.0	17.71 ∞	3.5 25.5					К8	15			
25	10	8.97 ∞	2	9.7	26	17.4	6	К8	7			

1. Симметричный окуляр



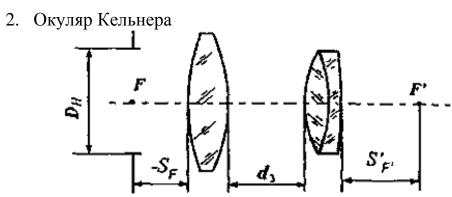
Вариант исполнения 1

вариант исполнения т							
		Кон	структивн	ые параме	тры		
<i>F'</i> мм	Sf mm	Sf' mm	D _н мм	r mm	d mm	Марка стекла	Св. ∅ мм
			54.7	1.5	Ф2		
			14.5	16.81	6	К8	17.5
20	140	140		-24.39	0.1	Возд.	
20	20 -14.9	14.9		24.39	6	К8	17.5
				-16.81	1.5	Ф2	
				-54.7		Возд.	

Вариант исполнения 2

Конструктивные параметры							
F'mm	Sf mm	Sf mm	D _н мм	r mm	d mm	Марка стекла	Св. ∅ мм
2.5	10.0	10.0	10	68.86	1.5	Ф2	22
25 -18.9	-18.9	18.9	18	21.01	7.5	К8	22

	-30.58	0.1	Возд.	
	30.58	7.5	К8	
	-21.01	1.5	Ф2	
	-68.86		Возд.	



Вариант исполнения 1

Конструктивные параметры							
<i>F'</i> мм	Sf mm	Sf' mm	D _н мм	r mm	d mm	Марка стекла	Св. Ø мм
				53.26	5	К8	10.5
				24.92	14.5	Возд.	19.5
20.04	20.04 -5.8	7.3	19	14.39	4.5	БК5	
				-10.73	1	Ф3	11.2
				-76.45		Возд.	

Вариант исполнения 2

Конструктивные параметры							
F' MM	Sf mm	Sf' mm	D _н мм	r mm	d mm	Марка стекла	Св. ∅
				66.18	6	К8	24.5
				-31.09	18	Возд.	24.5
24.99	-7.4	9	23.5	18.95	5.5	БК5	
				-13.54	1.5	Ф3	14
				-95.53		Возд.	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИЗМЕННЫЕ СИСТЕМЫ

При выполнении курсового проекта требуется разработать конструкцию узла крепления призмы в виде сборочного чертежа и спецификации к нему. Узел крепления призмы должен удовлетворять следующим требованиям:

- Обеспечивать надежность крепления, т. е. стабильности положения призмы в процессе эксплуатации;
- Обеспечивать отсутствие деформации и напряжений в стекле при закреплении призмы в оправе;
- Детали, крепящие призму, должны находиться вне зоны прохождения светового пучка;
- Обеспечивать технологичность деталей узла крепления и всей конструкции с точки зрения изготовления и сборки;
- Соединение призмы с базирующими и ориентирующими элементами узла крепления должно быть статически определенным;
- Ограничение смещений призмы в узле крепления должно осуществляться поверхностями, ориентированными перпендикулярно направлению возможных смещений призмы;
- Ограничение поворотов призмы должно осуществляться элементами узла крепления, расположенными на наибольшем удалении от центра поворота в пределах габаритов призмы.

За базовые следует выбирать наиболее широкие нерабочие поверхности призмы. Опорная плоскость оправы, на которую будет базироваться призма должна иметь высокую степень плоскостности. Ребра призмы не должны контактировать с элементами оправы. Между призмой и элементом, осуществляющим силовое замыкание, необходимо поместить эластичную прокладку, компенсирующую погрешности положения этого элемента и более равномерно распределяющую прижимное усилие по поверхности призмы.

В задании предусмотрены следующие варианты крепления призмы:

- 1. Крепление накладкой;
- 2. Крепление угольниками;
- 3. Крепление прижимными планками;
- 4. Крепление пружиной (плоской, цилиндрической, тарельчатой);
- 5. Крепление пружиной с регулировочным винтом;
- 6. Крепление комбинированным способом;
- 7. Крепление приклеиванием.

1.1 Призмы с одним отражением (типа А)

Bap.	Условное обозначение	Схема	Способ крепления
1	AP - 0°		1, 3, 5
2	AP - 45°	45°	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
3	AP - 60°	60°	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
4	AP - 90°	90°	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

1.2 Призмы с одним отражением с крышей

1.2 Призмы с одним отражением с крышей						
Вар.	Условное обозначение	Схема	Способ крепления			
1	A _K P - 45°	45	1, 2, 3, 6			
2	A _K P - 60°	60	1, 2, 3, 6			
3	A _K P - 90°	90	1, 2, 3, 4, 5			

1.3 Призмы с двумя отражениями (тип Б)

	1.3 призмы с двумя отражениями (тип ь)							
Bap.	Условное обозначение	Схема	Способ крепления					
1	БР - 180°		1, 2, 3, 4, 6					
2	БС - 0°		1, 2, 3, 5, 8					
3	БУ - 45°	45	1, 2, 3, 4					
4	БУ - 60°	60	1, 2, 3, 4					
5	БП - 90°	90'	1, 2, 3, 4, 8					

1.4 Призмы с двумя отражениями с крышей

	1.4 призмы с двуми отражениями с крышен						
Bap.	Условное обозначение	Схема	Способ крепления				
1	Б _К Р - 180°		1, 2, 5				
2	Б _К У - 45°	745	1, 2, 5				

3	Б _к У - 60°	460.	1, 2
4	Б _к П - 90°	9	1, 2

1.5 Призмы с тремя отражениями

Вар.	Условное обозначение	Схема	Способ крепления
1	BP - 45°	45	1, 2
2	BP - 180°		1, 2

1.6 Призмы с тремя отражениями с крышей

Bap.	Условное обозначение	Схема	Способ крепления
1	B _K P - 45°	45	1, 2, 3
2	B _K P - 180°		1, 2

1.7 Составные призмы

	X 7		C .
Bap.	Условное	Схема	Способ
	обозначение		крепления
1	Б - 90° Башмачная		1, 2, 3
2	К - 0° Призма-куб		3, 8
3	П - 0° Пехана		4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ВЫБОР НЕКОТОРЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 1. Зависимость ширины фасок от диаметров линз

	Ширина фаски, мм			
Диаметр детали, мм	для предохранен	в па и роп пошиа		
Z	Несклеиваемая сторона	Склеиваемая сторона	для крепления завальцовкой	
До 6 (включ.)	0,1+0,1	0,1+0,1	0,1+0,2	
Св. 6 до 10	$0,2^{+0,2}$] 0,1	0,3+0,2	
Св. 10 до 18	0,3+0,3		0,4+0,2	
Св. 18 до 30	0,3	0,2+0,2	0,5+0,3	
Св. 30 до 50	-	<u>†</u>	$0,7^{+0.5}$	
Св. 50 до 80	0,5 +0,5		1,0+0,5	
Св. 80 до 120		0,3+0,3		
Св. 120 до 180	0,7 ^{+0,7}] 0,3 %		
Св. 180 до 260	0,7			
Св. 260 до 360	1,0+0,8	0,5 ^{+0,5}		
Св. 360 до 500	1,2+1,0	0,8+0,8		
Св. 360 до 500	1,5 ^{+1,5}	1,0+1,0	-	

Таблица 2. Определение полного диаметра линз

Световой диаметр		Ø + ∆ <i>D</i> и креплении	Наименьшая толщина края положительных
линз св. Ø, мм	завальцовкой	прижимным кольцом	линз, мм
До 6 (включ.) Св. 6 до 10 10 18 18 30 50 80 80 120 120 180 180 260 260 360 360 500	0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 — — —	1,0 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0	1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Таблица 3. Размеры фасок на ребрах и углах некруглых деталей

Длина	Размер фаски для углов		Длина	Размер фаски для углов	
ребра, мм	двугран- ных	трехгран- ных	ребра, мм	двугран- ных	трехгран- ных
До 6 (включ.)	0,1 +0,2	$0,3^{+0,3}$	Св. 50 до 80	$0,7^{+0,8}$	2,5 ^{+0,8}
Св. 6 до 10	$0,2^{+0,3}$	$0,5^{+0,3}$	Св. 80 до 120	$0,8^{+0,9}$	3,0+1,2
Св. 10 до 18	$0,3^{+0,4}$	$1,0^{+0,4}$	Св. 120 до 150	$1,0^{+1,0}$	$3,5^{+1,5}$
Св. 18 до 30	$0,4^{+0,5}$	$1,5^{+0,5}$	Св. 150	$1,2^{+1,2}$	4,0+2,0
Св. 30 до 50	$0,5^{+0,6}$	$2,0^{+0,6}$			

Таблица 4 Углы наклона фасок круглых оптических деталей

Отношение диаметра	Угол наклона фаски α,°, на поверхности			
к радиусу поверхности D/R	выпуклой	вогнутой	плоской	
До 0,6 (включ.) Св. 0,6 до 1,5 Св. 1,5	45 30 —	45 60 90	45	

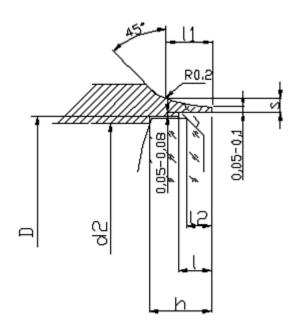


Рис. 1 Крепление линзы завальцовкой – размеры буртика

Таблица 5. Размеры гибкого буртика оправы при креплении завальцовкой (рис.1)

D	S	1	l_I	l_2
До 10	От 0.2 до 0.3	0.3 - 0.4	1.6	0.3
Св.10 до 30		0.5 - 0.7	2.0	0.5
Св.30 до 50	От 0.3 до 0.4	1.0 – 1.2	2.5	0.8
Св.50 до 80	От 0.4 до 0.5	1.2 – 1.6	3.0	1.0

Таблица 6. Выбор толщины отрицательных линз

		d , мм, при ΔN , полос			
Форма	D, mm	до 0,3	св. 0,3 до 0,5	св. 0,5 до 2,0	св. 2,0
	До 50		0,07D	0,07D	
	Св. 50 до 120				
Продморолицию	Св. 120 до 260				0,05D
Двояковогнутая	Св. 260 до 500			0,06 <i>D</i>	
	Св. 500 до 650	0.10D	0,06D		
	Св. 650 до 800				0,06D
	До 50		0,09D	0,08D	0,08D
	Св. 50 до 120				
Di iniur no-ponuimog	Св. 120 до 260		0,08D	0,06D	
Выпукло-вогнутая	Св. 260 до 500				0,06D
	Св. 500 до 650				
	Св. 650 до 800		<u> </u>		

Таблица 7. Углы полного внутреннего отражения от гипотенузой грани прямоугольной призмы

Марка стекла	n_e	ϵ_m	3
К8	1,6183	41°16′	5°41'
БК10	1,5713	39°36′	8°29'
ТК2	1,5749	39°30′	8°41'
ТК16	1,6152	38°19′	10°47'
ТФ2	1,6776	37°22′	12°38'
ТФ5	1,7617	34°44′	18°13'

Таблица 8. Допуски и посадки на диаметры линз, сеток, светофильтров и других круглых деталей

Допуск на	Поле допусков линз			
центрирование, мм	центрирующих	нецентрирующих	Назначение детали	
Повышенной точности (до 0.05)	g6, f7	<i>d</i> 11	Линзы светосильных фотообъективов	
Средней точности (св. 0.05 до 0.1)	h8, e9, f9	d9, c11	Линзы микрообъективов, телескопических приборов, сетки и шкалы средней точности	
Пониженной точности (св. 0.1)	c11	-	Конденсорные линзы, светофильтры, зеркала, защитные стекла	

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Латыев С.М. Конструирование точных (оптических) приборов. СПб.: Политехника, 2007. 579 с.;
- 2. Мальцев М.Д. Расчет допусков на оптические детали. М.: машиностроение, 1974. 168 с.;
- 3. Сокольский М.Н. Допуски и качество оптического изображения. Л.: Машиностроение, 1989. 221 с.;
- 4. Справочник конструктора оптико-механических приборов. Под редакцией В.А. Панова. Л.: Машиностроение, 1980. 742 с.;
- 5. Ключникова Л.В., Ключников В.В. Проектирование оптикомеханических приборов. СПб.: Политехника, 1995. 206 с.;
- 6. Крынин Л.И. Основы проектирования конструкций объективов. СПб.: СПбГУИТМО, 2006. 254 с.;
- 7. Зверев В.А., Кривопустова Е.В., Точилина Т.В. Оптические материалы. Часть 1. Учебное пособие для конструкторов оптических систем и приборов. СПб.: СПбГУИТМО, 2009 244 с.;
- 8. Кожевников Ю.Г. Оптические призмы. Проектирование, исследование, расчет. М.: Машиностроение, 1984. 152 с.;
- 9. Чуриловский В.Н., Халлилулин К.А. Теория и расчет призменных систем. Л.: Машиностроение, 1979. 269 с.;
- 10. Слюсарев Г. Г. Методы расчета оптических систем. М.: Машиностроение, 1969. 672 с.;
- 11. Погарев Г.В. Юстировка оптических приборов. – Л.: Машиностроение, 1982.-237 с.;
- 12. Толстоба Н.Д., Цуканов А.А. Проектирование узлов оптических приборов. Учебное пособие. СПб.: СПбГУИТМО, 2002. 128 с.



В 2009 году Университет стал победителем многоэтапного конкурса, в результате которого определены 12 ведущих университетов России, которым присвоена категория «Национальный исследовательский университет». Министерством образования и науки Российской Федерации была утверждена программа его развития на 2009–2018 годы. В 2011 году Университет получил наименование «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Кафедра Компьютеризации и проектирования оптических приборов (первоначальное название «Кафедра военных оптических приборов», позднее - «Специальных оптических приборов») была основана в 1939году. Она была призвана подготавливать инженеров по проектированию военных оптических приборов.

Как известно, к 1914 году потребности армии и флота удовлетворялись зарождающейся отечественной оптической промышленностью (включая филиалы фирм Цейсс и Герц в Риге) только на 30-40%. Остальные оптические приборы экспортировались. Фирма Карл Цейсс поставляла дальномеры, перископы сухопутные и для подводных лодок, бинокли, светосигнальные приборы. Фирма Герц – полевые артиллерийские панорамы, бинокли, большие стереотрубы, дальномеры, перископы для подводных лодок. Фирма Барр и Струд (Англия) поставляла оптические дальномеры, а фирма Росс - прямые зрительные трубы для морских прицелов. Фирмы Краус, Парра Мантуа (Франция) поставляли призменные бинокли. Фирма Офичино Галилео (Италия) продавала перископы для подводных лодок.

Возглавил кафедру известный специалист в области военных оптикомеханических приборов профессор К.Е. Солодилов На кафедру из Государственного оптического института пришли работать профессора Резунов М.А. и Цуккерман С.Т. Под их руководством на кафедре проводилась также и научно-исследовательская работа. Были разработаны, например, конструкции новых прицелов: пулеметного ПП1, авиационного АСП, ракурсного курсового.

В послевоенный период времени до 1970 года кафедру возглавлял проф. С.Т. Цуккерман, с 1971 по 1984 гг. заведовал кафедрой проф. Сухопаров С.А. (бывший главный инженер ЦКБ фирмы ЛОМО), в 1985 –90 гг. руководил кафедрой заслуженный деятель науки и техники проф. Зверев В.А.. С 1990 кафедрой заведует их ученик проф. Латыев С.М.

Выпускники кафедры всегда славились как хорошие конструктора, благодаря сильной проектно-конструкторской научно- педагогической школе, созданной Солодиловым К.Е., Цуккерманом С.Т., Резуновым М.А., Кулагиным В.В., Сухопаровым С.А.. Сотрудниками школы написано около двадцати монографий, учебных пособий и справочников по проектированию оптических приборов, ставших настольными книгами студентов и инженерно-технических работников оптической промышленности.

Основные научные направления работы кафедры связаны с разработкой теоретических основ конструирования оптических приборов, их точностного расчета и юстировки, автоматизацией функционирования приборов и их проектирования, а также с созданием автоматизированных измерительных фотоэлектрических приборов.

На кафедре были разработаны подобные приборы различного назначения:

- Механокардиограф для медицинских учреждений;
- Прибор для измерения скоростей и давления жидкостей;
- Прибор управления по лучу строительными машинами;
- Кинематомер для контроля точности зубчатых колес и редукторов;
- Стенд для контроля прецизионных муфт;
- Телевизионный дальномер;
- Стенд для контроля надежности биноклей;
- Фотоэлектрический автоколлиматор;
- Цифровой индикатор перемещений.

По результатам научных исследований аспирантами и сотрудниками кафедры были защищены десятки кандидатских и докторских диссертаций.

В настоящее время кафедра готовит бакалавров и магистров по направлению 200400 «Оптотехника», профили подготовки 200400.62 «Проектирование И метрология оптико-электронных приборов» 200400.68.14 «Проектирование и метрология оптико-электронных приборов инженеров направлению 200401 специального назначения» ПО «Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального профиль подготовки 200401.65.03 «Оптико-электронные назначения», приборы и системы специального назначения».

Студенты, обучающиеся на кафедре, имеют усиленную подготовку по использованию средств автоматизированного конструирования, контролю, юстировке и испытанию приборов, вопросам обеспечения точности их функционирования.

На кафедре имеются следующие учебные лаборатории: Компьютерный класс; Конструкторский класс; Приборов технического зрения; Военных приборов; Оптических приборов; Контроля и юстировки приборов,

метрологии и сертификации оптико-электронных приборов. Ряд учебных занятий по военным и космическим приборам проводится в лабораториях базовых кафедр при ГОИ и ЛОМО.

По учебной и научной работе кафедра имеет многолетнее сотрудничество с Техническим университетом Ильменау (Германия), благодаря которому наиболее успевающие студенты, аспиранты и сотрудники кафедры стажируются в лабораториях этого университета.

В настоящее время штатное расписание кафедры состоит из 12-ти ставок профессорско-преподавательского состава (три профессора и девять доцентов) и трех инженеров. На кафедре обучается восемь аспирантов

Иванов Александр Николаевич

Проектирование узлов оптико-электронных приборов. Методические указания к выполнению курсового проекта Учебное пособие

В авторской редакции А.Н. Иванов Редакционно-издательский отдел НИУ ИТМО Зав. РИО Лицензия ИД № 00408 от 05.11.99 Подписано к печати Заказ № Тираж 100 экз Отпечатано на ризографе

Н.Ф. Гусарова